第一章 緒 論

螢光材料為顯示器及照明的的主要關鍵材料,其和我們日常生活 緊密而不可分,然而螢光材料之發光特性並不單純,其主要原因實肇 因於螢光材料之純度、晶相、化學組成、結晶度、離子缺陷與錯位、 異相與晶界以及微結構(晶粒形貌與尺寸)等等因素,都直接或間接影 響螢光材料發光之性能。因此,在二次世界大戰後,隨著固態物理學 的發展,從固態的能帶理論(band theory)、晶格缺陷構造理論,以及 缺陷控制技術製雷射的開發,促使螢光材料的研究成為光電領域、雷 射半導體、顯示器中所不可或缺的重要課題。

and the second

近年來,螢光材料的研究主要有八個方向:

- 1. 三波長白光日光燈螢光材料的改進[1]。
- 2. 寬廣放射峰的結晶性螢光體在可調式雷射上的應用。
- 3. 近紫外激發螢光材料在白光發光二極體(white LED)上的應用。
- 發光玻璃及發光玻璃陶瓷類晶體在雷射、光纖、太陽能電池照明上的應用^{[2][3]}。
- 5. 低電壓高效率電激發光螢光體在場發射式顯示器(FED)的應用。
- 月量子剪裁(quantum cutting)特性的高效率螢光體在電漿顯示器 (plasma display panel)上的應用^{[4][5]}。
- 特殊規格的螢光材料,如高效率、均匀粒徑分佈、特殊型態及 長餘輝型發光材料。
- 奈米螢光材料在生物檢測技術上的應用,以及高解析度(high resolution)顯示器的應用。

近年來奈米科技的發展已成為一股旋風,風靡全世界。鑑於大尺 寸、高畫質、無視角、重量輕、低耗電及平面超薄顯示器的考量,奈 米螢光體具有粒徑小且塗敷性能好,高比表面積,單位質量或體積中 發光顆粒數增加,因此可能大幅減少單位面積塗佈量的用量,而且粒 徑分佈均勻,可提昇螢幕之解析度。

此外,(Gd_{2-x}Tb_x)O₂S 螢光體在輻射激發時,具有高能量轉換效率 (12-25%),可廣泛的應用於陰極射線管與 X-ray 的偵測器,例如:醫 學上 X-ray 透視顯像等。因此本論文以水熱法來製備(Gd_{2-x}Tb_x)O₂S 奈 米級螢光體,藉由調整 pH 值以期獲得晶粒尺寸小、粒徑分佈均勻之 螢光粉;同時,也探討其光致發光光譜圖、奈米晶體微結構、以及合 成條件之關係,並與固態合成法做完整之比較。



第二章 螢光體基本理論

2-1 發光原理

當一種材料受到光子或者其他帶有高能量的粒子如陰極射線、X 光、紫外光照射激發後,材料內部發生了能量的吸收與轉換過程,如 圖1^[6]所示,若此材料在吸收能量後,最後轉換出來的方式為發光, 則稱為發光材料。

一般而言,按照激發能量以及方式的不同,可以把發光分類為下 列幾種方式:

- 光致發光(photoluminescence,簡稱 PL):經由電磁波(常為紫外線)所激發所產生的光子,應用在螢光燈和電漿顯示器上。
- 2. 陰極射線發光(cathodoluminescence,簡稱 CL):由具有帶能量 100 KV 的電子束所激發,電視和陰極射線(CRT)顯示器都屬於它的應用。
 1896
- 3. X 射線發光(X-ray luminescence):應用在 X 光放大器(X-ray amplifier)上。
- 電激發光(electroluminescence,簡稱EL):加電壓所形成的電場 所激發,應用於熱門的發光二極體(LEDs)、電激發光顯示器(EL displays)等。
- 5. 熱發光(thermoluminescence): 由熱而生的色光,在天文學上常利 用此方式來判斷星體的溫度。
- 6. 摩擦發光(triboluminescence): 簡單而言為機械能所產生的光。
- 化學發光(chemiluminescence): 顧名思義即為化學反應而產生的 光,可應用於分析化學中使用。
- 8. 生物發光(bioluminescence): 生化反應所產生的光,如螢火蟲

等,也可作為分析之用。

 超音波發光(sonoluminescence): 在液體中的超音波放射也可以 產生出光,若於水中就屬於一310 nm 左右的連續波。

若依材料本質大致可分為下列三種:

- 1. 有機螢光材料,如:日常生活用有機增白劑及螢光染料。
- 無機螢光材料,如:II至 VI 鹼土族及稀土族,應用於照明、影 像管、顯示器領域之電子元件。
- 半導體螢光材料,如:三五族或二六族化合物、發光二極體、雷射二極體,此類材料常用於用於LED顯示器、傳真機、印表機等。

and the second

固態發光材料的組成是由一個材料主體(host)以及掺雜少量雜 質作為活化劑(activator)。有時須掺雜另一種雜質作為敏化劑 (sensitizer),而活化劑及敏化劑部分取代主體晶格中原有格位的離 子,形成雜質缺陷,由這些缺陷所引起的發光稱為激活發光,而活化 劑在發光材料中所扮演的角色為發光中心,其受到外來的能量激發後 會產生特徵的可見輻射。而敏化劑的加入,可將所吸收之能量傳遞給 活化劑,使能量能更有效地以發光的形式回饋出來,圖 2^[7]表示為螢 光體發光過程中能量傳遞示意圖。另一種發光是由主體的結構缺陷所 引起的,稱之為非激活發光,產生這種發光不需添加活化劑。

當發光中心或活化劑離子受一能量激發後,促使其電子的躍遷至 激發態,而當電子由激發態緩解回到基態時伴隨光能放射的現象即為 發光。而螢光或磷光均屬於自發性發光。螢光必須遵守選擇律 (selection rule),其電子能量的轉移不改變電子的自旋態(△S=0), 其半生期短,約為10⁻⁹~10⁻³秒;而磷光往往不遵守選擇律,電子能量 的轉移可改變電子的自旋態 (△S=1),其半生期較長,約為 10⁻³~10 秒。圖 3^[8]為螢光及磷光放光機制示意圖。

一般可利用組態座標圖的觀念來說明電子躍遷與能階的關係。橫座標為陽離子與陰離子團間的平衡距離(R₀),縱軸為能量 E,其間的關係可用振子(oscillator)中能量與位移的關係式 E = 1/2kr²來描述, 其中 k 為力常數(圖 4)^[9]。

由於晶格振動會影響發光中心,而使發光中心離子的電子躍遷可 以和主體晶體中周圍離子交換能量。之外,晶場強度也會對發光中心 的能階高低,分裂程度,與周圍離子間的相關位置發生影響,故應把 發光中心和其周圍的晶格離子看做是一個整體來考慮。

根據 Frank-Condon 原理,因為原子核的質量比外層電子大的多, 其振動頻率也慢的多,因此在電子的迅速躍遷中,晶體中原子間的相 對位置和振動頻率可以近似的看做恆定不動。換言之,當電子由基態 (ground state) 躍升至激發態(excited state)時,物質內部原子核間 的距離 R 可視為未曾改變;而躍遷產生時,以基態的電子機率最高, 也就是 R_0 位置處為主。而當該躍遷的 $\triangle R = 0$ ($\triangle R = R_0 - R$)時,稱 之為零點躍遷(zero-transition)或是無聲子躍遷(non-phonon transition),其吸收或放射光譜皆為窄譜峰(sharp peak)。但並非所有 的躍遷都是零點躍遷,當主體晶格與活化中心產生聲子波傳遞 (phonon wave propagation),而引起電子與晶格振動偶合 (vibronic-coupling)時,會有一明顯的距離改變($\triangle R$),此情況之 光譜為寬譜帶。當 $\Delta R \gg 0$ 時,電子遷移與聲子(phonon)或晶格振動 偶合作用強,而當 $\Delta R = 0$ 時偶合作用最弱。我們可由圖 5 看出 $\triangle R$ 與應用能量效率的關係,當 ΔR 越大,其應用效率越差。

一般而言,激發能量大於放射能量,因此吸收光譜的波長短於放

射光譜的波長,此差異稱為史托克斯位移(Stokes shift),如圖 6^[7]所 示,可以下列方程式加以定義:

Stokes shift = $2Sh \nu$

S: Huang-Rhys 偶合常數且與 $(\triangle R)^2$ 成正比

h: 浦郎克常數, ν : 振動能階之差,R: 金屬離子與配位基之距離 $\triangle R$: 電子在基態與激發態時 R 的差

若S<1則為弱偶合作用,光譜中主要是零聲子躍遷,若1<S<5, 則為中偶合作用,在光譜中主要的窄帶放射上可以看到有弱的零聲子 躍遷,如果S>5則是強偶合作用,吸收和放射光譜均為寬帶,看不 到零聲子躍遷,而且史托克斯位移很廣如圖7。

2-2 螢光材料的組成及設計

無機螢光體主要由主體晶格(host lattice)及活化劑(activator)構成,有時可掺加適當增感劑(sensitizer)。化學式以H:A 或者H:A,S 表示,如:Gd₂O₂S:Tb³⁺、SrAl₂O₄:Eu²⁺, Dy³⁺等。詳細介紹如下:

2-2-1 主體晶格之選擇

無機螢光體的主體晶格通常為一個或數個陽離子與一個或數個 陰離子團結合而成,通常主體在激發的過程中所扮演的角色為能量的 傳遞者,而主體中的陽離子或陰離子必須是不具光學活性的,如此一 來,能量的吸收與放射皆由活化劑進行。陰離子團的選擇則分為兩部 分:一是不具光學活性的陰離子團,另一則是具有光學活性可充當活 化劑之陰離子團,後者通稱為自身活化(self-activated)的螢光體,如 CaWO4、YVO4,表1^[10]為週期表中可作為螢光體主體晶格的陰離子。 陽離子的選擇條件需具有如鈍氣的電子組態(如 ns²np⁶、d¹⁰)或具封閉 的外層電子組態(如 f⁰、f⁷、f¹⁴),如此才不具光學活性,表 2^[10]為週期 表中可作為螢光體主體的陽離子。

2-2-2 主體晶格之影響

在不同的主體晶格中,活化劑離子所處的環境也有所不同,因此 其所表現的發光特性也有所差異。若能夠了解主體晶格對發光特性的 影響,就能預測螢光材料發光的性質。在不同的主體晶格中,主要有 兩個影響光譜特性的因子:一為主體共價性;另一則是主體結晶場的 強度。對共價性的因素而言,當共價性增加時,則電子間的作用力會 呈現減弱。在不同能階間,電子的躍遷之能量是取決於電子間的作用 力,所以當共價性增加則會促使其對應的電子躍遷往低能量偏移。而 主體晶格具較高的共價性時,意味著其其陰陽離子間的陰電性差異變 小,所以所對應的電荷轉移 (charge-transfer)躍遷能量,亦往低能量 偏移。

對結晶場強度因素而言,不同的主體晶格具有不同結晶場的強度,所以會造成不同能階差的分裂,最常見的例子為具有 d 價軌域的 過渡金屬離子,其電子的躍遷對應波長取決於結晶場強弱,不同電子 組態的過渡金屬離子,其受結晶場強度影響而造成能階的差異,可由 Tanabe-Sugano 能階圖中得知。圖 8 為具有 $d^3 \pi d^5$ 電子組態離子受 結晶場影響,產生能階分裂的情形。例如:在 Al₂O₃:Cr³⁺和 Cr₂O₃中, 兩者結構相同但在外觀顏色兩有明顯的不同: Al₂O₃:Cr³⁺為紅色而 Cr₂O₃則為綠色。這是因為在 Al₂O₃:Cr³⁺中,Cr³⁺離子佔據較小的 Al³⁺ 格位,因為結晶場強度增強,使得躍遷的能量較 Cr₂O₃ 中 Cr³⁺之電子 躍遷來得高。因此,也可以利用此一類發光中心,來觀察晶格格位的 環境。在稀土離子中,因為5 s 和 5 p 軌域電子的蔽障效應(shielding

effect)的關係,內層 4 f 軌域電子受到結晶場的影響是較微弱的,圖 19 為具有 4 fⁿ 電子組態的自由三價稀土離子之能階圖。

2-2-3 活化劑之選擇

一個適當的活化劑通常具有 nd¹⁰(n+1)s²的電子組態或是半滿的 外層電子之價態,而最重要是在主體晶格中,能穩定且以特定價數存 在的離子,如表 3^[10]所示。此外,掺到晶格中的活化劑的價態,在晶 格中的位置、活化劑周圍的情況,是否有增感劑,這些都會影響發光 中心的結構和它的性質。有些規則可以提供我們選擇適當的活化劑, 如:活化劑離子與主體晶格離子其離子半徑大小之搭配,若兩者離子 半徑差異過大,則易造成晶格扭曲與殘留應力(residual stress)於晶 格中,活化劑在主體晶格中的溶解度亦因此受限,進而減低螢光體發 光。或當兩離子之價數不符,亦會造成電荷補償問題,也會使發光效 率降低。在多數情況下發現當活化劑的濃度達到並超過一定數值之 後,發光效率不再繼續提高,反而開始下降,這種現象叫做濃度焠滅 (concentration quenching)。這是因為活化劑濃度過高時,能量在活化 離子之間的傳遞機率超過了發射機率,激發能量重複地在活化離子之 間傳遞。

2-2-4 抑制劑

陽離子具有順磁電子組態時會抑制發光,許多陽離子都具有兩種 以上的價態,如果價態錯誤且較穩定存在於主體內,就會由活化劑變 成抑制劑,會成為能量陷阱並消耗掉部分的激發能量,表4^[10]列出了 部分具有抑制發光作用的陽離子。

2-2-5 增感劑

根據增感劑和活化劑發光強度,再配合理論分析,若能掌握其濃度的變化以及發光強度的衰減,則可以判斷晶體中這種傳遞能量的機制。兩個中心間的能量傳遞可以:(一)通過發光的再吸收或(二)激發能量的無輻射傳遞兩種,如果兩個中心之間具備以下條件,就可能發生高效的能量傳遞(其機制如圖 10^[6]):

(1) 當活化劑和增感劑的基態和激發態之間的能量差相等時,則活 化劑和增感劑之間具備互相共振的條件,實際上可根據增感劑的發射 光譜和活化劑的吸收光譜是否重疊來判斷。

(2) 當活化劑和增感劑之間存在著適當的相互作用時,此相互作用可以是交換作用(如果活化劑和增感劑相距很近,波函數重疊),也可以是電多極或磁多極之間的相互作用(如果相距較遠,彼此只能藉助庫侖力相互作用)。

能量轉移的程序曾被Forster. Later Dexter 深入探討過並以下列方 程式加以描述:

 $P_{SA} = 2\pi/h \langle S, A^* \rangle HAS \langle S^*, A \rangle ^{2} g_S(E) g_A(E) dE$

其中,式中的積分表示光譜重疊,P_{SA}表示增感劑到活化劑的能 量傳遞速率,H_{AS}表示利用漢彌爾頓運算子,S和S^{*}分別表示電子的 基態和激發態的狀態函數。活化劑和增感劑必須有共振的條件和存在 交互作用,才可能有較高的能量傳遞機率,即得到大的P_{SA}值。

2-3 螢光材料之製備方法

螢光體的製備方法發展至今,由傳統的固態燒結法,到使用溶劑 製備的濕化學方法(wet chemical method),其主旨不外乎是希望能發 展出高均勻度、粒徑大小適中、高純度、高亮度、高發光效率的螢光 產物以及操作時穩定性高的材料製程。以下將簡介一些常用且常見的 材料製備方法:

2-3-1 固態合成法 (Solid state method)^[11,12]

固態合成法通常使用金屬氧化物(metal oxides)或金屬碳酸鹽 類(metal carbonates)為起始物,依所需比例混合研磨後,再進行後 續的熱處理動作。此為一簡單且廣為應用的方法,優點為產物結晶性 相對較高,但其缺點是產物的組成均勻度(homogeneity)不佳與產物 粉體粒徑無法有效控制等缺點。常用的改善方法如:以球磨法(ball milling)促使組成均勻;但因各金屬鹽在空氣中吸收水的程度不同, 可能造成金屬離子不同比例的流失;而溶劑的濕式混合研磨(wet mixing and milling),則因各金屬鹽溶解度不同,混合效率不佳,故 其效果有限,所以需要比濕化學方法更長的燒成時間及更高的燒成溫 度。一般固態法通常適用於少量材料製備的基礎研究,或新系統之開 發。這是一種極為簡單的方法,可以迅速發現此化合物是否有潛力於 實際的應用上。

2-3-2 溶膠 - 凝膠法 (Sol-gel method)^[13]

溶膠-凝膠法主要是利用二元有機酸(dicarboxylic acids)與金屬鹽 類混合均勻,以多元醇(polyol,通常為乙二醇ethylene glycol)為溶劑, 加熱攪拌或直接將金屬鹽類與多元醇加熱混合以形成金屬醇鹽化合 物(metal alkoxide),或以金屬醇鹽化合物(metal alkoxide)溶於醇類, 加熱攪拌使其完全溶解為澄清之溶液(sol),再加入酸或鹼作為催化 劑,經水解聚合後即可形成黏禂狀的凝膠(gel),再經過熱解 (pyrolysis)之處理,即可得到粉末狀前驅物(precursor)。其特點反應 物種多,產物顆粒均一,過程易控制、具有量產的潛能,且再現性極 佳,適於氧化物和II~VI族化合物的制備。此外,此法並具有能塗佈 (spray coating)於大面積基材上的特點,但是其缺點為金屬醇鹽錯 合物取得成本較高,不利於商業化量產。

此外,溶膠-凝膠法可降低製程溫度,使顆粒圓滑,更可以經 由控制 pH 值來調整粒徑大小,相對於固態法,可得到發光強度較高 之螢光體,故此法不失為合成金屬氧化物(Metal Oxide)螢光體的好 方法。

2-3-3 共沉澱法 (Co-precipitation Method)^[14]

共同沉澱法的基本原理,乃利用適當的沉澱劑(通常為有機酸、 驗),如草酸根(oxalate)、檸檬酸根(citrate)與碳酸根(carbonate) 等,將各種不同的金屬離子從溶液中以相近的速率形成沉澱,再經過 過濾、乾燥等動作形成組成均勻的前驅物,經熱處理及高溫燒結後取 得最終產物。此法的優點為合成容易,不需要特殊的設備或者昂貴的 原料即可進行。此外,本法尚有程序的控制、原料的取得容易、製程 再現性高、製程溫度降低、粒徑分佈均勻,以及顆粒表面較平滑(與 固態法比較)等優點,但純度低,顆粒半徑大(對合成奈米而言),適合 制備氧化物,因此具有螢光粉材料商業化或大量生產的潛能。

2-3-4 膠體共沈法^[15]

主要使用三乙基胺作為金屬離子之沈澱劑,在金屬硝酸鹽水溶液 中,加入適量的三乙基胺攪拌後,三乙基胺會與金屬離子反應形成錯 化合物,由於三乙基胺上乙基親水性較差,所以被三乙基胺包覆的金 屬離子便會與水分離,再行過濾、烘乾即可得到細緻的粉末狀前驅 物。此法的優點為製程溫度可以有效降低,且步驟簡單。

2-3-5 氣溶膠熱解法(Aerosol pyrolysis method)

相關儀器構造如圖 11 所示,製程方法為將溶有離子的水溶液經 噴霧器噴灑預先裂解,再於高溫爐中進行後熱處理以合成螢光體,其 優點為簡便並可應用於實際量產上。

2-3-6 微乳液法 (Microemulsion method)^[15,16]

利用油相(oil)、水相(water)兩個互不相溶的相態,加上界面 活性劑,使得油相-水相界面的表面積擴張,表面張力下降;當表面 張力下降到一定程度時,系統的表面活化能(或張力)之增加量相當 小。因而產生乳化現象(emulsification),而當表面張力幾乎趨進於 零或暫時為負值時,便會形成我們所稱的微乳液(micromusification)。

微乳液是各等向性(isotropic)、熱力學安定(thermodynamically stable)、透明(transparent)的相態,依照溶質與溶劑的關係可以區分為:油/水相微乳液(oil in water microemulsion, O/W)及水/油相微乳液 (water in oil microemulsion, W/O)。以O/W 型微乳液為例,油相為膠 體分散媒,水相為溶媒。

由於微乳液中的液滴直徑約在 0.01µm 至 0.1µm 之間,且粒子的 單分散和介面性好,在 W/O 相微乳液中,水相被油相包覆在內,形 成所謂反微胞 (reverse-micelle),化學反應如氧化、還原、水解等均 可在微胞內進行,因此又可叫做"奈米反應器" (nanoreactor),此 即為微乳液法的最大優點(圖 12),一般 II~VI 族半導體奈米粒子多用 此法製備。

2-3-7 水熱法 (hydrothermal method)^[17,18]

此法適用於合成高溫不穩定相 - 即低溫相或次穩定相 (metastable phase),以及含有特殊氧化態的化合物,其特點為純度 高,分散性好,粒徑易控制。水熱反應是在密閉反應器內進行,依反 應溫度可區分為兩類:

- (a)中溫高壓型:溫度範圍在 100 ~275 間,所以適用於以鐵氟龍 當內容器的 Parr acid digestion bomb(高壓反應器,如圖 13(a)^[19] 與 13(b)^[19]所示),其容量約為 23 ml,材質的溫度及壓力上限 分別為 260 與 100 bar,一般使用 65%的溶液填充度,將高壓 反應容器置於高溫爐中加熱至反應溫度即可。此法雖然能承受的 溫度與壓力有限,但是若能選擇適當的酸鹼 PH 值,亦能利用此 反應器合成新穎化合物。
- (b) 高溫高壓型(>275):此系統中,水熱反應是在密閉的高溫反應器內進行,水的臨界溫度與壓力分別是 374.1 與 217.6 atm, 在高溫高壓水熱反應系統中,水的性質變化包括:密度變低、表面張力變低、黏度變低等。所以當處於超臨界狀態時,水中離子的滲透速率會大幅增加,使得其中晶體的生長速度增快。

Mannun .

相同的,如果將溶劑水改成非水溶劑(non-aqueous solvents),則 稱之為熱溶劑(solvothermal)合成法,基本上熱溶劑法與水熱法的原 理是一致的,一般常用的有乙二胺或甲醇等。前者可形成奈米棒狀 物,乃歸因於乙二胺具有鉗合效果,使得此溶劑在反應進行中可與反 應離子形成配位化合物,其以此配位化合物為模板進行反應,並藉由 此模板來控制晶體生長方向,此機制稱為 SCMT(Solvent coordination molecular template)^[20,21],而後者則為球狀,本論文著重於控制 pH 值,故屬於水熱法範疇。

2-3-8 其他製程

螢光體或光電材料之單晶或薄膜,可以分別以 Czochralski 法成

長大型單晶或化學氣相沈積法(chemical vapor deposition, CVD)製備 薄膜。

2-4 螢光體光學特性的量測

2-4-1 輝度的量測

若要決定螢光體內所摻雜活化劑的最佳濃度,那我們首先要合成 一系列具有不同濃度活化劑的螢光體。塗一層樣品於載具上,另外準 備一標準螢光體與之比較。所謂的"標準"是指具有相似的放射特性 者,通常使用 254 nm 的紫外燈(汞燈),然後使用適當的偵檢器來量 測螢光體之放射強度。

2-4-2 激發或放射光譜之量测

由於固體中的原子或離子的核質量遠遠大於電子的質量,所以它 們的振動頻率差別也很大。所謂晶體受到照射或激發,主要是指晶體 中原子或離子的外層電子受到外界施加的能量,而產生的振動、躍遷 或轉移。對於發光材料的晶體而言,則把它們所吸收的激發能量一部 份以可見光輻射的形式釋放出來,產生發光現象。最常見之螢光體發 光性質的量測即為放射光譜,可由放射光譜的量測得到螢光體之最佳 激發能量(或波長)與最強放射範圍,常用的量測儀器有光致發光光譜 儀(PL 光譜)及陰極射線螢光光譜儀(CL 光譜)。CL 光譜以陰極射線管 所產生的電子作為激發源,為電致發光的一種,而PL 光譜一般則由 Xe 燈作為激發光源,提供 200~900nm 之有效輻射範圍,藉由單光 晶體 (monochromator) 來調整所需要的激發波長,以觀察螢光體的 放射光譜,並進而由放射光譜放射峯強度之強弱以反推尋求其佳激發

2-4-3 餘輝光譜的量測

餘輝光譜的量測係使用螢光光譜儀,量測時將長餘輝粉體預置於 黑箱中,以確保無光源干擾以期其殘留餘輝訊號接近背景值,然後利 用儀器本身 Xe 燈及分光功能為激發源照射螢光體,其充分吸收能 量,停止照射後移除激發源,藉由儀器本身的光電倍增管為偵測器, 同時掃瞄餘輝光譜並同時紀錄餘輝強度隨時間衰減關係。

2-4-4 量子效率的量测

當光子照射螢光體時,有部分被吸收或傳遞,有部分則被反射。 對一個優良的螢光體而言,激發能被吸收後而能大部分以光的形式再 放出,即能量傳遞的過程損失極少。為瞭解螢光體的發光量子效率 QE(quantum efficiency),可以下列方程式來加以定義:

QE=放射光子數 / 吸收光子數 ES

若以能量的觀點而言,則為放射能量總合與吸收能量總合的比值。此時 QE 可以表示為:

 $QE = \{ (Id\lambda)_{emission} / (Id\lambda)_{absorption} \} \{ (1-R)_{absorption} / (1-R)_{emission} \}$ 其中 I 為強度、 λ 為波長、R 為反射率,可由比對吸收光譜中得出反 射能量大小得知。

所謂優良的螢光體,泛指其 QE 值約為 80%或更高者。若定義 S 為標準樣品, U 為未知樣品,則未知樣品之量子效率為:

 $(QE)_{U} = (QE)_{S} \times \{(\Sigma E d\lambda_{ex})_{S}\} / \{(\Sigma E d\lambda_{ex})_{U}\} \times \{(\Sigma E d\lambda_{em})_{U}\} / \{(\Sigma E d\lambda_{em})_{S}\} \times \{(1-R)_{S}\} / \{(1-R)_{U}\}$

其中 E 為能量,λ_{ex}、λ_{em}分別代表激發與發射波長,Edλ_{ex}可以用吸 收值代入。

2-4-5 光色的判别

色光是由紅藍綠三原色光以不同比例混合而成,但人類對這三種 顏色的敏感度不一,人眼可以感知到顏色三種屬性:色調(hue)、彩度 (chroma)與亮度(lightness)。色調是指各種不同主波長的色彩區隔,如 紅黃綠等,是顏色「質」的特性。飽和度是指色彩的純度,也是描述 顏色中的純光譜所佔的比例,純度愈高即表示顏色光中混入白光或其 他色光的比例愈低。亮度是指光的強度或物體表面亮暗程度,是顏色 「量」的特性。物體顏色的產生主要由下列三因素所決定:照射光源 光譜能量分佈曲線、被照物體對波長的穿透或反射曲線及接收器(通 常是人眼)對各種波長之感光能力^[22]。而紅、藍、綠三原色光按照不 同比例的搭配,可讓我們的視覺上感受不同的色光,此乃三原色光原 理^[23,24]。為更正確說明色光的顏色,國際照明委員會(CIE, Commission Internationale de l'Eclairage)。確定了原色當量單位,標準的白光光通 量比為:

 $\Phi r : \Phi g : \Phi b = 1 : 4.5907 : 0.0601$

原色光單位確定後,白光 Fw 的配色關係為:

Fw = 1[R] + 1[G] + [B]

其中R表紅光,G表綠光,B表藍光。

對任意一彩色光 F 而言,其配色方程式為:

Fw=r[R]+g[G]+b[B]

其中 r、g、b 為紅、藍、綠三色係數(可由配色實驗測得),其對應 的光通量(Φ)為:Φ=680(R+4.5907G+0.0601B)流明(lumen, 簡稱 lm,為照度單位),其中 r、g、b 的比例關係決定了所配色的光 之色彩度(色彩飽和程度),它們的數值則決定了所配成彩色光的亮 度。r[R]、g[G]、b[B]通稱為物理三原色,三色係數之間的關係,可 以利用矩陣加以表示,標準化(normalization)之後可以寫成: $F = X[X] + Y[Y] + Z[Z] = m\{x[X] + y[Y] + z[Z]\}$

其中m=X+Y+Z且x=(X/m)、y=(Y/m)、z=(Z/m)

每一個發光波長都有特定的r、g、b值,將可見光區範圍的r值 相加總合為X,g值相加總合為Y,b值相加總合為Z,因此我們 可以使用 x、y直角座標來表示螢光體發光的色度,這就是我們所謂 C.I.E.1931標準色度學系統,簡稱C.I.E.色度座標。圖14中的黑色舌 形曲線代表譜色軌跡,也就是說所有譜色光都在線上面,自然界中的 色彩皆能使用整個閉合曲線及其內部所對應點的座標來表達。當座標 點的位置越靠近譜色軌跡,其所對應的色彩越純。當量測光譜後,計 算各個波長光線對光譜的貢獻,找出 x、y 值後,在色度座標圖上標 定出正確的座標位置,我們就可以定義出螢光體所發出光之顏色。圖 15 為 CIE 色彩匹配函數圖。

2-5 能量傳遞的機制探討

2-5-1 螢光體之淬滅溫度(Quenching Temperature, T_q)

對依螢光體而言,當環境溫度高於螢光熱淬滅溫度時,被認為不 發光;反之,當環境溫度低於 T_q時,則可以發光。在 1948 年 Kröger 就對 T_q作一定義:在溫度對螢光體發光強度作圖,在曲線取相對強 度為 80%和 20%兩個點,通過這兩點作一直線,則此直線與代表溫 度的橫軸之截距為 T_q(如圖 16)在綜合表 4 的數據和 Seitz、Dexter 所 提出之模型(如圖 5),很明顯地,當激發態與基態之金屬離子與配位 基之距離差(△R)愈大時,非輻射緩解的機制愈容易發生,而螢光體 通常會有較低的淬滅溫度。

此外,1969年 Blasse 指出影響△R 兩個因素為活化劑所取代主 體晶格中陽離子的大小與活化劑周圍陽離子的電荷及大小。他歸納一

些實驗結果(如表 5、6),並提出一個模型(如表 7)來說明活化劑離子 大小與螢光淬滅的關係。其中對於△R 的符號正或負,作者認為必須 '視發光中心的本質而定。在一個螢光體的發光過程中,如果金屬陽離 子(活化劑)帶正電程度變大,更吸引鄰近陰離子(配位基),以致於在 激發態時金屬離子與配位基的距離比在基態時還小,故△R的符號為 自。對於激發機制起始於陰離子, $(如 O^2 - Sm^{3+})$ 的電荷轉移), 在激發 時陽離子接受陰離子轉移的電子,使得陽離子的帶正電程度變小,因 而對周圍陰離子的斥力增加,所以△R 符號為正。圖 17(b)表示激發 熊能量曲線與基熊能量曲線不相交,如果以圖 17(a)的描述則電子的 緩解不能回到基態,但當△E等於或小於發光中心周圍環境較高震動 頻率的四到五倍時,則此機制將會發生,通常這樣的非輻射緩解過程 稱作多聲子放射。圖 17(c)則表示整個包括發光與非輻射過程牽涉到 三能量曲線,整個機制簡言之就是電子從基態透過允許(allowed)的躍 遷到激發態,經過非輻射緩解而到另一激發態,再經由禁止(forbidden) 的躍遷回到基態。 44000

2-5-2 螢光體活化劑離子濃度淬滅效應 (Concentration quenching effect)^[7]

欲使能量轉移發生所需之條件是所涉及的離子具有大致相等的 激發能態,且彼此足夠靠近。因發光體中所有相同的活化劑離子皆具 相同激發能態,且當發光體中活化劑離子濃度增加時,使他們足夠靠 近致使能量轉移極易發生。其結果便是在活化劑的濃度較高時,激發 能量可以從活化劑離子至活化劑離子被散佈遍及於主體晶格中,直到 它找到一個「毒劑」的位置且被耗損在主體晶格中,此過程以圖 18 表示^[22]。

若考慮兩個擁有相同環境且對等的離子,如果兩個離子之間電子

遷移速率甚高的話,則電子在激發時所吸收的能量,將會傳遞到能量 猝熄的格位(quenching site)。若此現象發生,則將會降低螢光體的發 光效率,此即為我們所熟知的濃度猝滅效應。通常這種降低發光效率 的情形不會在低濃度時發生,此乃由於兩個相同離子間的距離甚大, 足以互相隔離,促使此種發光效率降低的情形不會發生。Blasse 指出 Tb³⁺與 Eu³⁺離子在高濃度下,發生交叉緩解(cross-relaxation),而降低 發光效率的過程可以用下列方程式表示

 $Tb^{3+}({}^{5}D_{3}) + Tb^{3+}({}^{7}F_{6}) \rightarrow Tb^{3+}({}^{5}D_{4}) + Tb^{3+}({}^{7}F_{0})$

 $\operatorname{Eu}^{3+}({}^{5}D_{1}) + \operatorname{Eu}^{3+}({}^{7}F_{0}) \rightarrow \operatorname{Eu}^{3+}({}^{5}D_{0}) + \operatorname{Eu}^{3+}({}^{7}F_{3})$

最高能階的能量放射,將會因為偏好較低能階的轉移,而使得發光行 為消失。

若我們再考慮最高能階的發光行為(如圖 5 所示),如能階間的能 量差較主體晶格的聲子最高振動頻率(ν_{max})小四至五倍,則往往會誘 發高能振動(high-energy vibrations)而失去能量並產生輻射發光,這種 緩解現象常被稱為多重聲子的發光(multi-phonon emission)。所以最高 能階的放射發光行為常與發光中心離子(luminescent centers)的濃度並 沒有一定的依存關係,但是交叉緩解的過程中,在某一個濃度時,就 會產生發光強度遞減的現象,此常被歸因於高濃度時,交叉緩解的過 程與兩個發光中心離子的交互作用力有一定的依存關係。

2-5-3 金屬離子間電子轉移的機制^[25]

根據激發態能階高低不同,可以分成下列各種不同金屬與配位基 (ML_n, metal- ligands)的能量轉移形式:

以金屬為中心(metal-centered, MC)的激發態,電子激發的過渡時 期常被假設固定於金屬上。以配位基為中心(ligand-centered, LC)的激

發態,則電子激發的過渡時期常被假設固定在配位基上。至於電荷轉 移(charge- transfer, CT)的過渡狀態,電子激發的過渡時期則產生電荷 轉移的現象,例如:電子由金屬轉移到配位基稱為(MLCT),或者是 電子由配位基轉移至金屬稱為(LMCT)。在錯合物中,金屬至金屬間 的電荷轉移(MMCT),常涉及不同金屬間的電荷轉移,此時在激發態 的過渡時期,電子由一金屬轉移到另一金屬,此現象被稱為價態間電 荷轉移(intervalence charge- transfer transitions)的過渡時期。在錯合物 中,若具有不同的配位基,則有可能發生配位基到配位基間的電荷轉 移(LLCT)。

2-5-4 稀土離子價態轉換相關因素之研究^[26]

以上敘述顯示:稀土離子間電子轉移造成的價態變化與4f軌域電 子充填的狀況(全空、半滿或全滿)有關。但許多實驗證明,除了電子 組態的影響之外,其電子轉移的難易與化學或物理性質亦有密切關 係,諸如稀土離子的第三電子游離能、還原電位、電負度等等因素均 屬之;此外,甚至稀土離子在晶格中所處的格位,也具有相關性,所 以稀土離子電子轉移所造成價態變化實取決於多種因素。

2-6 奈米材料^[27,28]

奈米材料是一群原子和分子的組合,其主要是針對尺度在 1~100 nm 材料的製造技術和新材料性質的研究,最早利用奈米材料來命名 材料始於 20 世紀的 80 年代,然而奈米材料的發展則更早於此時。1962 年,日本久保等人對金屬超微粒子進行研究,提出相當著名的久保理 論,即是超微顆粒的量子限域理論,開啟探索奈米尺度超微顆粒的大 門。1987 年,日本豐田研究所成功研發 Nylon6 和 Clay 的奈米高分子 複合材料,從而開啟奈米材料的研究風潮。1990年7月在美國巴爾 的摩舉辦國際第一屆奈米科學技術學術會議,正式將奈米材料科學劃 分為材料科學的另一全新分支。

儘管奈米材料只不過是傳統材料經奈米技術處理,而獲得具有化 學上的表面與介面效應、光電磁學上的量子尺寸效應和小尺寸效應等 獨特特性的材料而已。可是應用它,可使產品不但輕薄短小,且更具 省能源、高容量密度、高精細、高性能、高功能和低公害等優點,為 新材料和次世代之光、電、磁元件的建構基石。

奈米材料又稱為超微顆粒材料,由奈米粒子組成。它具有表面 效應、小尺寸效應和宏觀量子隧道效應。同時顯示出許多奇異的特 性,即它的光學、熱學、電學、磁學、力學以及化學方面的性質和大 塊固體時相比將會有顯著的不同。其實奈米效應與現象一直存在於自 然界中,並非全是科技產物,例如:蜜蜂體內因存在磁性的奈米粒子 而具有羅盤的作用,供蜜蜂活動導航之用;蓮花效應(lotus effect), 水滴滴在蓮花葉片上,形成晶瑩剔透的圓形水珠,而不會攤平在葉片 上的現象,便是蓮花葉片表面的奈米結構所造成。因表面不沾水滴, 污垢自然隨著水滴從表面滑落,此奈米結構所造成的蓮花效應(lotus effect)已被開發並商品化為環保塗料。

2-6-1 奈米材料的種類

一般區分為奈米粉末、奈米纖維、奈米薄膜、奈米塊體等四類。 其中奈米粉末開發時間最長、技術最為成熟,是生產其他三類產品的 基礎。

(1) 奈米粉末(Nano Powder): 又稱超微粉或超細粉。可用於高密度磁記錄材料; 吸波隱身材料;磁流體材料;防輻射材料;單晶矽和精密光學

器件抛光材料;防輻射材料;單晶矽和精密光學器件抛光材料;微晶片 導熱基片與布線材料;微電子封裝材料;光電子材料;先進的電池電極 材料;太陽能電池材料;高效催化劑;高效助燃劑;敏感元件;高韌性陶 瓷材料(摔不裂的陶瓷,用於陶瓷發動機等);人體修復材料;抗癌制劑 等。

(2)奈米纖維(Nano Fiber):指直徑為奈米尺度而長度較大的線狀材料。可用於:微導線、微光纖(未來量子計算機與光子計算機的重要元件)材料;新型鐳射或發光二極管材料等。如奈米碳管;奈米纖維; 奈米柱等。

(3) 奈米薄膜(Nano Film): 奈米膜分為顆粒膜與緻密膜。顆粒膜是奈米 顆粒粘在一起。中間有極為細小的間隙的薄膜。緻密膜指膜層緻密但 晶粒尺寸為奈米級的薄膜。可用於:氣體催化(如汽車尾氣處理)材料; 氟體感測材料;過濾器材料;高密度磁記錄材料;光敏材料;平面顯 示器材料;超導材料等。

(4) 奈米塊體(Nano Bulk): 是將奈米粉末高壓成型或控制金屬液體結 晶而得到的奈米晶粒材料。主要用途為:超高強度材料;智慧金屬材 料等。

2-6-2 奈米材料的性質

(1)光學性質:

當黃金被細分到小於光波波長的尺寸時,即失去了原有的富貴光 澤而呈黑色。事實上,所有的金屬在奈米微顆粒狀態都呈現為黑色。 尺寸越小,顏色越黑,銀白色的鉑變成鉑黑,金屬鉻變成鉻黑。由此 可見,金屬奈米微顆粒對光的反射率很低,通常可低於1%,大約幾

微米的厚度就能完全消光。利用這個特性可以作為高效率的光熱、光 電等轉換材料,可以高效率地將太陽能轉變為熱能、電能。

微粒尺寸縮小時,光吸收度或微波吸收度都顯著增加,並且產生 吸收峰等離子的共振頻移,產生新的光學特性,如對紅外線有吸收和 發射作用,但對紫外線有遮蔽作用等,不同粒徑材料的遮蔽力將隨光 波長大小而有所不同。其應用如超微粒子鈦白粉(TiO₂)在可見光

(380-700 nm)的照射下呈現透明,但對於波長更短的紫外線則具有 較強的遮蔽率,常用於抗紫外線玻璃的成份。

(2)熱學性質:

固態物質為大尺寸時,其熔點是固定的,超細微化後發現其熔點 顯著地降低,當粒徑小於10 奈米時尤為顯著。例如,金的熔點為 1064℃,當顆粒尺寸減小至10 奈米尺寸時,則降低27℃,2 奈米尺 寸時的熔點僅為327℃左右;銀的熔點為670℃,而超微銀顆粒的熔點 可低於100℃。因此,超細銀粉製成的導電漿料可以進行低溫燒結, 此時元件的基片不必採用耐高溫的陶瓷材料,甚至可用塑膠。

奈米材料表面原子的振幅約為內部原子的1倍,隨著粒徑逐漸減 小,表面原子的比例也逐漸日增,奈米材料的熔點將會降低。奈米微 粒在低溫時,其熱阻很小,熱導性極佳,可做為低溫導熱材料。

(3)磁學性質

人們發現鴿子、海豚、蝴蝶、蜜蜂以及水中的趨磁細菌等生物中 存在奈米的磁性顆粒,這生物在地磁場導航下能辨別方向,具有回歸 的本領。磁性奈米微粒實質上是一個生物磁羅盤,生活在水中的趨磁 細菌依靠它遊向營養豐富的水底。通過電子顯微鏡的研究表明,在趨 磁細菌體內通常含有直徑約為20 奈米的磁性氧化物顆粒。

由於奈米材料的小尺寸效應,使得磁有序態轉變成磁無序態,超

導相轉變為正常相,因而產生新的磁學特性。當顆粒粒徑減小時,其 磁化率隨溫度降低而逐漸減少。像是鐵一鈷一錄合金這樣的強磁性材 料的奈米微粒,其信號雜訊比極高,可供做為記錄器使用; 奈米級的 Fe₃O₄的磁性材料,其粒子間磁性干擾極弱,利用適當的界面活性劑 使其分散於流體中,可成為強磁性的磁流體,因此可發展成多用途工 具。

(4)電學性質

金屬粒子內的原子間距會隨粒徑變小而變小,此時其密度會增 大,導致金屬內自由電子的平均自由徑減小,導電性亦呈下降。

(5)力學性質

陶瓷材料通常具有脆性,然而由奈米微粒壓製成的奈米陶瓷材料 卻具有良好的韌性。因為奈米材料具有大的介面,介面的原子排列是 相當混亂的,原子在外力變形的條件下很容易遷移,因此表現出甚佳 的韌性與一定的延展性,使陶瓷材料具有新奇的力學性質。

由於奈米材料表面原子的配位不足,再加上極強的凡得瓦力的作 用下,使得奈米複合材料的強度、耐磨性、韌性、耐壓性、抗老化性、 緻密性與防水性等特性大為增加和改善。此外,強烈的凡得瓦爾力及 大量表層原子強化粒子間的黏合性,結晶構造可能因此改變^[29]。

(6) 化學鍵性質

粒子尺寸趨近奈米範疇時,離子鍵型晶體會呈現更多共價鍵特性;共價鍵型的晶體會逐漸呈現更強的離子鍵特性;而金屬鍵型晶體 會呈現更多離子鍵或共價鍵的特性。

2-6-3 奈米材料的物理效應

(1)小尺寸效應

當材料奈米化時,導致其對光、電磁、熱力學、聲等物性展現跟 其塊材(bulk materials)時不同的效應。諸如大多數的金屬材料為之光 吸收顯著增加、矯頑力(coercive force)增加、熔點下降。

(2)表面效應

當材料奈米化時,其表面原子數增多,比表面積(surface area / volume)隨之增加,為之表面能量增加而活性(催化能力)提高的效應。 諸如一些金屬或金屬氧化物為之很容易跟其他原子結合,曝露在空氣 中會吸附氣體,並進行反應,甚而自燃;也由於表面能量高,粒子也 可能發生結晶構造異常、熔點或燒結(sintering)溫度下降的現象。 (3)量子穿隧效應

就古典力學的觀點而言,一個處於位能較低的粒子根本不可能躍 過能量障礙而到達另一邊,除非粒子的動能超過V₀;但就量子力學 的觀點來說,卻有此可能性發生。所謂的「穿隧效應」就是指粒子可 穿過比本身總能高的能量障礙,而穿隧的機率與距離呈反比的關係, 若是距離愈近,則穿隧的機率愈大。

(4)量子侷限效應

當材料奈米化時,一材料如金屬和半導體其價帶(valence band) 和導帶(conduction band)的能隙會為之變寬的效應(圖 19^[30]),趨向展 現絕緣性。因此量子狀態密度可呈現線狀、不連續狀、階梯狀與連續 狀的差異^[30,31]。換言之,奈米金屬和半導體充電和放電過程中,電流 隨電壓的上升不再呈現直線上升,而是階梯式上升。

與塊材相比, 奈米微粒普遍呈現吸收帶藍位移的現象, 對於奈米 粒子吸收帶藍位移的解釋有兩方面: 一為量子尺寸效應, 由於尺寸變 小導致能隙變寬, 使吸收帶往短波長移動; 另一原因為表面效應, 由

於奈米微粒顆粒小,大的表面張力使晶格畸變,晶格常數變小。鍵長 的縮短導致奈米微粒的鍵振動頻率增大,結果造成吸收帶向短波長偏 移。

隨者粒徑的減小,量子尺寸效應會導致吸收帶的藍位移;但是粒徑減小的同時,顆粒內部的內應力(內應力 P=^{2γ}/_r,r為離子半徑, γ為表面張力)會增加,這種內應力的增加會導致能帶結構的變化, 電子波函數重疊加大,結果導致能隙、能級間距變窄,造成電子由低 能階躍遷到高能階及半導體由價帶躍遷到導帶引起的吸收帶發生紅 位移現象。



第三章 文獻回顧與研究動機

3-1 文獻回顧

1969年 Yoshiok 等人^[32]曾研究可見光區 Gd₂O₂S: Eu³⁺於室溫和 液態氮溫度下之發光特性,當77K時,強度明顯的改變是由於藉由 晶格振動的 Eu³⁺- Eu³⁺間的相互作用力而不單只是簡單的共振效應; 同時發現,與Y₂O₂S: Eu³⁺比較時,光譜呈現藍位移並可觀測到晶體 層次的收縮。

1974 年美國 RCA 的 Forest ^[33]發表 "分析稀土氧化物與稀土硫 氧化物的方法"專利,其藉由激發硫氧化物與氧化物的樣品,利用發 射稀土光譜譜線相對強度以鑑別兩種螢光體。

1979 年 Hoelsae 等人^[34]曾探討 $Gd_2O_2S:Tb^{3+}$ 之濃度淬滅效應,推測其發光源自偶極-偶極或偶極-四極之相互作用,為影響 ${}^5D_3 \rightarrow {}^7F_J(blue)與 {}^5D_4 \rightarrow {}^7F_J(green)放光淬滅的機制。$

1981年Yokono^[35]曾探討Ln₂O₂S:Ce³⁺(Ln=La, Gd, Y, Lu)的發光 性質,發現當溫度低於170K時,可觀察到Ln₂O₂S:Ce³⁺呈現紅色螢 光,並發現其吸收光譜與發射光譜間,有史拖克式位移(Stokes sift) 現象。

1984年Kano^[36]發現以Ca²⁺掺雜於(Y_{1-x}Gd_x)₂O₂S 主體中,在波 長為 575~595nm 範圍中,觀察到黃光寬帶的陰極射線發光(CL)光 譜。此外,在掺雜Mg²⁺、Sr²⁺、Zn²⁺、Cd²⁺、Mn²⁺、Zr⁴⁺、Th⁴⁺、Hf⁴⁺
等離子的CL光譜,亦可發現相似的寬帶特性陰極射線光譜。

1992 年日本信越化學工業株式會社山田和弘與吉田紀史兩人^[37] 發表"稀土硫氧化物的精製方法"專利。指出可將稀土硫氧化物於管 狀爐中做熱處理以除去硫氧化物製程中殘留的硫黃(S)。同年 Wu 等

人^[38]利用 angular overlap model(AOM)計算 Ln₂O₂S: Eu³⁺(Ln = Lu,Y, Gd, La)系列之 angular overlap 參數,結果得到在四個硫氧化物晶體 中,4f 電子與配位基間共價能力的大小為: Lu>Y>Gd>La。

1996 年 Reddy 等人^[39]測量掺雜 Eu³⁺離子的 Y₂O₂S、La₂O₂S 與 Gd₂O₂S 等螢光體的光致發光光譜,並標定在不同主體晶格中 Eu³⁺發 射峯之相對強度及其 CIE 色度座標。

1998 年 Tamatani 等人^[40,41]利用誘導偶合熱電漿製備 0.5-15 μm 球狀 Ln₂O₂S:R (Ln = Y, La, Gd, and/or Lu; R = 稀土離子),其色度座 標值範圍為(0.31-0.33, 0.31-0.33)和光反射率 95%;然而,藉由熱電漿 處理會降低其發光效率,可藉由適當的退火作為補償。

1999年 Nakamura^[42]等人發現在Gd₂O₂S:Pr中加入0.2-0.3%之氣 離子可增加其光輸出率至107%,並降低餘輝效果至4%;同時發現增 加退火溫度亦可降低其餘輝特性。同年錢逸泰等人^[43]以La(NO₃)₃ nH₂O與硫脲為反應物,再分別使用水、無水酒精與其1:1混合液當 作溶劑,進行奈米La₂O₂S粉體熱溶劑合成,並以TEM觀察其微結構, 結果發現La₂O₂S粒徑約為150 nm之球體。

2000年 Yang 等人^[44]以 La(OH)₃ 膠體與 K₂S 分別在水、無水酒精 與乙二胺等不同種溶劑中,進行高壓水熱溶劑反應以製備奈米 La₂O₂S 粉體,並以 TEM 觀察其微結構。結果顯示產物 La₂O₂S 粒徑約為 10 nm 且其晶粒形態則因溶劑不同而異。

2003 年 Li.等人^[45]利用水熱法,以及一連串的去水、硫化或氟化 的過程,可合成 Ln(OH)₃、Ln₂O₃、Ln₂O₂S、Ln(OH)_{3-x}F_x(Ln=La, Gd, Y 等稀土離子)等化合物之的奈米管;由於稀土離子半徑的不同,以及 隨後晶場的改變,對奈米管的直徑大小造成影響。同年 Morlotti 等人 ^[46]曾探討 R 與 Tb³⁺共掺 Gd₂O₂S:R, Tb³⁺ (R =Ca²⁺, Ta⁵⁺, Sn⁴⁺, Ru⁴⁺)之

光致發光(PL)、熱發光(TL)、輻射致發光(RL)以及餘輝衰退動力學 之特性鑑定;其發現點缺陷濃度上的不等價離子取代,以致過量或缺 少電荷被晶格所捕捉,此為影響共摻之光學特性之原因。

2004年 Hirai 等人^[47]利用微乳液系統(水/油/水)以及之後在空氣 或硫氣氛中,藉高溫燒結製備粒徑大小約 20-60 nm 之 Gd₂O₃:Yb,Er 與 Gd₂O₂S:Yb,Er;並發現在兩個紅外光子(λ_{ex} =980 nm)激發過程中 可獲得來自 Gd₂O₃:Yb,Er 或 Gd₂O₂S:Yb,Er 有上轉換的放射(前者為紅 光,而後者為綠光)。

3-2 研究動機

奈米科技已成為全世界科技發展的重點之一,諾貝爾獎得主 Richard Smalley 教授於 1999 年 6 月 22 日美國參議院奈米科技聽證會 上強調:奈米科技對未來人類健康及生活福祉之貢獻,絕對不亞於本 世紀微電子產品、醫學影像、電腦輔助工程、人造高分子材料之總貢 獻。由於奈米螢光體具有應用於高解析顯示元件之潛力,故就合成的 化學與應用考量,應極具研究價值。

由上述文獻回顧顯示,Gd₂O₂S 螢光體的相關研究大都集中於微 米級材料之製程,或發光特性、色度座標與能量轉移機制的探討;對 於奈米 Gd₂O₂S 螢光體製備化學與奈米材料研究相當缺乏,故引起本 人研究對合成不同微結構之奈米 Gd₂O₂S 產生極大之興趣。適逢 2003 年 Li^[45]等人利用水熱法合成一系列 Ln(OH)₃、Ln₂O₃、Ln₂O₂S、 Ln(OH)_{3-x}F_x(Ln=La,Gd,Y 等稀土離子)等化合物之的奈米管,因此本 論文擬嘗試利用 pH 值調控,以合成不同微結構之奈米(Gd_{2-x}R_x)O₂S (R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺)系列螢光體,並探討其發光特性與微結構間的 相互關聯,最後再與固態法所合成之微米級(Gd_{2-x}R_x)O₂S 發光特性作 比較。

3-3 Gd₂O₂S 主體與其前驅物 Gd(OH)₃ 結構簡述

Gd(OH)₃具有P63/m空間群,屬於六方(Hexagonal)的晶體結構(其結構如圖20(a)所示)。其JCPDS卡號為38-1042,由 Beall等人於1977 年發表的文獻報導,其晶格常數 a = 6.345Å、 c = 3.63Å。

 Gd_2O_2S 具有 P-3m1 空間群,屬於六方(Hexagonal)的晶體結構(如圖 20(b)所示),其JCPDS 卡號為 26-1422,首先由 Onoda 等人於 1900 年發表的文獻指出,其晶格常數 a = 3.852Å、c = 6.667Å。本研究 中所摻雜的 Tb³⁺、Eu³⁺或 Pr³⁺等活化劑離子,推測應進入 Gd³⁺的格位。 金屬離子位於具有 C_{3v}對稱中心之格位,被4 個氧離子與3 個硫離子 所配位。



第四章 實驗方法

4-1 實驗藥品

- 硝酸釓 (Gadolinium nitrate hexahydrate, Gd(NO₃)₃ 6H₂O)
 純度 99.9%, Strem Chemicals Company Inc., U.S.A.
- (2) 硝酸鋱 (Terbium nitrate pentahydrate, Tb(NO₃)₃ 5H₂O)
 純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A.
- (3) 硝酸镨 (Praseodymium nitrate pentahydrate, Pr(NO₃)₃ 5H₂O)
 純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A.
- (4) 硝酸銪 (Europium nitrate pentahydrate, Eu(NO₃)₃ 5H₂O)
 純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A.
- (5) 碳酸鈉 (Sodium carbonate, Na₂CO₃)純度 99.5%, Merck, Germany.
- (6) 硫脲 (Thiourea, NH₂CSNH₂)純度 98.0%, Showa Chemicals Inc., Japan
- (7) 氧化镨 (Praseodymium oxide, Pr₂O₃)純度 99.9%, Cerac incorporated, USA
- (8) 氧化銪 (Europium oxide, Eu₂O₃)純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A.
- (9) 氧化釓 (Gadolinium oxide, Gd₂O₃)

純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A.

(10) 氧化鉽 (Terbium oxide, Tb₄O₇)

純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A

(11) 硫粉 (Sulfur powder, S₈)純度 99.9%, Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A

(12) 石墨 (Graphite, C)

Aldrich Chemicals Company Inc., U.S.A

- (13) 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide, NaOH)OSAKA, Japan
- (14) 硝酸 (Nitric acid, HNO₃)65%,GR 試藥分析級,Merck, Germany.
- (15) 鹽酸 (Hydrochloric acid, HCl)

35%,台灣聯工化學股份有限公司新竹廠

- (16) 去離子水 (Deionized water, H₂O)Milipore Milli-Q (Bedford, MA, U.S.A.)所製造
- (17) 硫化氫氣體 (30% H₂S in Ar) 新竹縣竹北市三福化工股份有限公司
- (18) 氯化釓 (Gadolinium chloride hexahydrate, Gd(NO₃)₃ 6H₂O)
 上述氧化釓與試藥級鹽酸製備而成



4-2 儀器設備

(1)高溫爐組 (High Temperature Furnaces)

使用新店市陵勝企業公司生產的箱型爐,加熱空間約為7,056cm³, 配備 Eurotherm 818P 型溫控器及矽化鉬加熱元件,最高溫度可達 1,700 及美國 Lindberg 公司生產的程式控溫箱型爐,加熱空間約為 9,880cm³,溫度上限為1,100°C(圖 21)。

(2)高溫管狀通氣爐

使用美國 Lindberg 公司製造之 51442 型,搭配 Eurotherm 818P 型程式溫控器的管狀爐,其溫度上限為 1,000°C(圖 22)。 (3) X 光繞射儀 (X-ray Diffractometer)

使用應化所今年購買之 Bruker AXS D8 advance 機種 X 光繞射儀 (圖 23),光源為銅靶,功率為 2.2KW。X 光源產生之原理為利用 40kV 的操作電壓,加速電子撞擊銅靶以激發銅原子,經單光晶體分光,使 之產生波長為 1.5405 Å,Ka 的 X 射線,量測時之操作電流為 40 mA。 掃瞄範圍之 20 值為 10 至 80 度,掃瞄模式為 20/0,掃瞄速率為每分 鐘 16 度。量測前先將樣品研磨成均勻細粉,固定在 holder 上進行量 測;必要時以矽粉做內標,以校正繞射峰之 20 值。最後利用 DIFFRAC plus 軟體處理數據及圖像。

(4)螢光光譜儀 (Spectrofluorimeter)

使用美國 Jobin Yvon-Spex Instruments S. A. Inc.公司所製 Spex Fluorolog-3 螢光光譜儀(圖 24),搭備 450W 氙燈與 Hamamatsu Photornics 所製造 R928 型光電倍增管為偵測器,掃瞄波長範圍為 200 nm 至 1000 nm。

(5)色彩分析儀 (Color analyzer)

使用日本LAIKO所製DT-100色彩分析儀(圖25),搭配螢光光譜儀 即可測得螢光體樣品之輝度、對比度、 閃爍以及色度。

(6) 場發射掃瞄式電子顯微鏡 (Field emission scanning electron microscopy, FESEM)

本研究中所合成樣品均勻度與表面微結構之探討,係利用國科會 設於交通大學國家毫微米實驗室(NDL)中的Hitachi S-4000 型掃瞄式 電子顯微鏡(圖26)進行量測,電子源為場發射金屬鎢尖絲,操作電壓 為0.5-30 kV之間,放大倍率為可至30萬倍。本儀器係利用電磁場偏 折聚焦電子,與電子和物質產生背向散射電子及二次電子原理成像。

(7)穿透式電子顯微鏡(Transmission electron microscope, TEM)

使用國科會新竹貴重儀器中心設於國立清華大學材料中心二館 120室JEOL JEM-4000EX 的TEM,其加速電壓為400 kV、放大倍率為 80到2×10⁶倍、影像分辨率可至1.8 Å。

(8) 紫外--可見光譜儀(UV-Visible Spectrometer)

本研究所合成固態樣品的全反射光譜量測使用日本 Hitachi 公司 所製型號 U-3010 紫外--可見光譜儀,並配備 ϕ 60 積分球(integral sphere),掃瞄波長範圍為 190 nm 至 1000 nm(圖 27)。

4-3 實驗步驟



本論文藉由pH值調變,可以有效成功合成不同微結構奈米 Gd₂O₂S:R螢光體具有不同晶粒形貌,其合成步驟詳述如下:

4-3-1 奈米Gd₂O₂S:R(R = Eu³⁺, Pr³⁺, Tb³⁺)螢光體之合成 4-3-1-1 棒狀Gd₂O₂S:R水熱法合成實驗流程圖





(PL)、SEM、TEM 微結構及表面分析與色度座標測定

4-3-1-2 Gd2O2S:R奈米棒狀水熱法合成實驗製程

將上述之氧化釓改以硝酸釓(或氯化釓)取代,在加入適量 0.5M 硝酸溶液為完全溶解狀態,於攪拌過程中緩慢滴入定量 0.5M 氫氧化 鈉,此時會有懸浮物產生,並控制溶液 pH 值在 10-13,其餘合成步 驟同上述流程。

4-3-1-3 Gd2O2S:R奈米塊狀水熱法製程

本製程仍以硝酸釓為釓之來源,其餘實驗流程如 4-3-1-2 所述, 唯將pH值調整為8-9之間。



硫化氫退火製程用管狀爐示意圖

(A、C瓶:安全瓶防止逆流;B瓶:NaOH_(aq)中和硫化氫;D瓶: 甘油與水混合溶液(v/v=1/3)可減緩硫化氫排放速率。當溶液由澄清

變成白濁狀態時,需更換新溶液以維持正常吸附功能。)

4-3-2 微米級Gd₂O₂S:R (R = Eu³⁺, Pr³⁺, Tb³⁺)螢光體之合成

Gd₂O₂S:R螢光體之固態合成主要依循兩種途徑: 第一種為雙坩 堝石墨還原製程 (裝置如下圖所示),第二種為硫化氫退火製程(裝置 如上圖所示)。以下分別以流程圖敘述Gd₂O₂S:R螢光體之固態合成:

4-3-2-1 雙坩堝石墨還原合成實驗流程圖

依化學計量秤取 Gd₂O₃、3 倍計量的硫粉、所需掺雜的氧化物, 以及 Na₂CO₃作為助熔劑,全部約 0.5g


提供還原氣氛的石墨雙坩堝反應容器裝置示意圖

通氫氣或硫化氫的還原效果比石墨所能提供者為強,然而為考量 成本,一般仍會先嘗試石墨還原。在還原氣氛下,過量的硫粉會和碳 酸鈉形成硫化鈉,有助於催化硫進入格位形成Gd2O2S。

4-3-2-2 硫化氫退火製程流程圖



第五章 結果與討論

Gd₂O₂S 的合成方法甚多,本研究主要嘗試的方法為水熱法,目 的是為了合成奈米級螢光體並有效控制其形貌與粒徑;除與固態法 所合成塊材作發光特性之比較外,計畫探討奈米材料所特有之量子侷 限效應。

本研究曾嘗試甲胺(MeNH₂)、二甲基甲醯胺(DMF)、乙二醇 (EG)、磷酸三丁基酯(TBP)等作為熱溶劑法所使用的溶劑,發現三 個問題:第一,無法一步合成 Gd₂O₂S。第二,大部分產物之晶粒形 狀不具規則性(只有 DMF 可合成約 100 nm 之塊狀物,但其產率相當 低)。第三,溶劑會參與反應或不易完全去除(只有甲胺和乙二醇易去 除)。故在第二階段之 H₂S 退火過程中,還原氣氛會將有機物碳化, 而得到黑色粉末,不利螢光體之發光。一般使用有機溶劑合成時,產 率較高且分散非常好,所以不用作分散的動作; 然而會有部分有機物 之殘留,不易完全去除。上述結果顯示這些溶劑不適用,因此本研究 最後選擇控制 pH 值為反應之溶劑。

5-1 奈米 Gd(OH)3 合成之研究

由於利用高壓反應器在 140-200 進行熱溶劑反應,無法一次合成 Gd₂O₂S,只能合成其前驅物 Gd(OH)₃,且其微結構在後續的高溫 退火過程中能維持不變,故前驅物的研究亦是相當重要的。熱溶劑合 成研究結果發現,硫並沒有進入 Gd₂O₂S 晶格中,然而為了實驗的一 致性,在其他相同實驗中仍加入定量之硫脲。

5-1-1 水熱法所合成 Gd(OH)3 之 X 光繞射圖譜分析

圖 28 為在高壓熱溶劑反應中,以不同溫度合成奈米 Gd(OH)₃之 XRD 圖譜;圖 29 為在 140 下,含釓不同反應物所合成奈米 Gd(OH)₃ XRD 圖譜之比較。以硝酸釓合成之 Gd(OH)₃ 結晶性較以氧化釓所合 成者弱,唯在強鹼存在下可合成 Gd(OH)₃(白色粉末);以氯化釓所合 成灰色產物之結晶性更差,無論在強鹼或弱鹼中,均無法由 XRD 圖 譜判斷。上二圖中大部分與 JCPDS No. 38-1042 比較結果一致(即圖中 最下方之多條直線)。

下表為含釓不同反應物在不同 pH 值條件之溶解度與 Gd(OH)3 產 率之比較:

釓來源	氧化釓	硝酸釓	硝酸釓	氯化釓	氯化釓
溶解度	幾乎不溶	全溶	全溶	全溶	全溶
(pH=6)		(無產物)	(無產物)	(無產物)	(無產物)
溶解度	11.11	懸浮狀	A E	懸浮狀	
(pH=8-9)		(稀)		(稀)	
溶解度			懸浮狀		懸浮狀
(pH=10-13)		- ALLEN	(濃)		(濃)
產率	高	低	中	低	中

由於反應為控制 pH 值,故可視為在水中反應,已知硫脲與水反應^[43]為:

 $NH_2CS NH_2 + 2 H_2O \rightarrow 2 NH_3(g) + H_2S(g) + CO_2(g)$

當 NH3和結晶水(若反應物為硝酸釓或氯化釓,則含結晶水)反應時:

 $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4OH$

 $Gd(NO_3)_3 + 3 NH_4OH \rightarrow Gd(OH)_3(s) + 3 N_2O(g) + 6 H_2O(g)$

 $GdCl_3 + 3 NH_4OH \rightarrow Gd(OH)_3(s) + 3 NH_4Cl$

或與水反應(由於在強鹼中反應,因此下面的 HCl 不會造成影響):

 $Gd(NO_3)_3 + 3/2 H_2O \rightarrow Gd(OH)_3 + 3 N_2O(g) + 3/4 O_2(g)$

 $GdCl_3 + 3 H_2O \rightarrow Gd(OH)_3(s) + 3 HCl$

若反應物為氧化釓(高溫高壓時應可反應):

 $Gd_2O_3(s) + 3 H_2O \rightarrow 2 Gd(OH)_3(s)$

然而硫脲與水反應生成之 H₂S 並無法使 Gd(OH)₃ 變為 Gd₂O₂S,只能 在第二階段之硫化氫退火製程時才可形成:

 $Gd(OH)_3(s) + H_2S(g) \rightarrow Gd_2O_2S(s) + 3 H_2O(g)$

實驗時曾發現水熱法製程中,溫度越高,可形成棒狀 Gd₂O₂S:R 的 pH 值範圍越大,但本論文並未深入探討其變化範圍。

5-1-2 奈米 Gd(OH)3表面微結構之分析

圖 30 為以氧化釓與硫脲在 pH=6之弱酸溶液中,於不同溫度下 反應所得奈米 Gd(OH)3 產物的 SEM 微結構影像。圖中顯示在 140-200 均可合成奈米棒狀微結構。在 140 時,其形狀大小非常規 律勻稱,可知在此高溫高壓下,氧化釓應該已經全溶(室溫下幾乎不 溶),否則無法生成如此均勻之奈米棒狀物;當溫度逐漸增加時,大小 差距亦逐漸變大,其原因該是高溫時反應較為劇烈,造成其生成速度 會有落差,甚至也有團聚現象的干擾,導致大小不均的情況。

圖 31 為以硝酸釓或氯化釓分別與硫脲反應,在不同 pH 值下所 合成奈米 Gd(OH)₃之 SEM 影像。當 pH 值小於 9 時,兩者均可獲得 粒徑尺寸粗估約為 80 nm 之塊狀結構,圖中顯示奈米粒子間存在嚴重 的團聚現象,此乃因奈米化的尺寸,使粉體的粒子間距降低、表面積 迅速增加導致凡得瓦爾力增強,界面自由能增加,因此奈米粒子分散 體趨向再聚集,以減少其表面積和界面自由能^[48],然而 pH 值太低 時,並無產物形成;當 pH 值大於 10 時,則可獲得長度、直徑分別 為 200nm 與 20nm 之棒狀奈米晶。因為大部分合成之前驅物為 Gd(OH)₃,故推測晶粒形貌之差異該與 OH⁻造成之環境有關,機制的 解釋目前仍不詳。只知道曾有文獻^[45,59]報導,在強鹼下可形成管狀結 構。以及部分文獻^[60,61]提及在其他化合物中,pH 值改變時,會呈現 奈米棒、塊狀之轉變。

5-2 奈米與微米級 Gd2O2S 合成之研究

曾有文獻^[43]指出,使用砒啶當溶劑以合成 La₂O₂S,合成溫度至 少400℃以上。礙於高壓反應器的耐壓有限,無法將製程溫度提昇至 200℃以上,故將第一階段合成的前驅物置於硫化氫中進行熱處理, 使之在更高溫下退火以形成晶型 Gd₂O₂S。硫化氫不僅可提供硫的來 源,且同時可提供強還原氣氛,有助於硫化反應進行,進而合成 Gd₂O₂S。

為了方便之後的討論,圖中敘述均以前驅物 A-E 或前驅物 A:R 代表不同條件下水熱法所合成之產物:

	反應物	水熱法
前驅物 A	Gd_2O_3 / Thiourea / pH = 6	140 ,18h
前驅物 B	$Gd(NO_3)_3$ $6H_2O/Thiourea / pH < 9$	140 ,18h
前驅物C	$Gd(NO_3)_3$ $6H_2O/Thiourea / pH > 10$	140 ,18h
前驅物 D	GdCl ₃ $6H_2O$ / Thiourea / pH < 9	140 ,18h
前驅物 E	GdCl ₃ $6H_2O$ / Thiourea / pH > 10	140 ,18h
前驅物 A:R	Gd_2O_3 / Thiourea / pH = 6	140 ,18h
	$\mathbf{R} = \mathbf{T}\mathbf{b}^{3+} \cdot \mathbf{P}\mathbf{r}^{3+} \cdot \mathbf{E}\mathbf{u}^{3+}$	

當活化劑被掺入 Gd₂O₂S 主體晶格時,由於所用活化劑的掺雜量 不超過4 mol%,所以活化劑是否進入主體晶格中,無法由 XRD 的圖 譜之解析加以判斷,但是光致發光(PL)光譜特性可以協助判定活化劑 離子是否已被掺入晶格中,這部分的研究,留待光譜部分再行討論。

5-2-1 奈米 Gd2O2S X 光繞射圖譜之分析

圖 32 為在 H₂S 氣氛中,於不同溫度所合成奈米 Gd₂O₂S 之 XRD 圖譜,由此圖譜分析可知 500℃已可合成 Gd₂O₂S 的晶相,但仍然有 微量的雜相(Gd₂O₃)存在,故本研究選擇 600℃、4 小時作為合成奈米 Gd₂O₂S 最低退火條件,且溫度越高結晶性越強。此外,本研究發現 當退火溫度較低時,其結晶性較差,且繞射峯的半高寬變寬,此乃粒 徑奈米化所造成。圖 33 為不同釓來源在 H₂S 氣氛中於 600℃、4 小時 所得產物之 XRD 圖,由圖譜中可知由 GdCl₃ 6H₂O 合成之 Gd₂O₂S X-光繞射強度特別弱,其原因除了其粒徑小與結晶性差外,起始物純度 不高也是造成之原因之一。圖 32 與 33 均與 Gd₂O₂S 之 JCPDS No. 26-1422 圖譜一致(即圖中最下方之直線)。

5-2-2 奈米 Gd2O2S 表面微結構之分析

圖 34 為前驅物 A 於 600 H₂S 氣氛中反應所合成奈米 Gd₂O₂S 之 SEM 影像。由圖可證明:高溫退火製程並不會改變前驅物晶粒形 貌,直接印證此製程對可成功合成奈米硫氧化物。由於奈米晶團聚相 當嚴重,若仔細觀察產物可發現其為許多直徑約 100-200 nm,而長 度為 1-2μm 左右之棒狀晶粒組成。

而圖 35(A)為 pH=6 時,硫脲與氧化釓反應,並在 H₂S 氣氛中於 600 所合成奈米 Gd₂O₂S 產物的 TEM 微結構影像圖,晶粒成棒狀, 直徑 30-50 nm、長度約 400nm,由於 TEM 不會受聚集之影響,故觀 測到之影像較小,由 TEM 圖可證實其為棒狀結構而非管狀。圖 35(B) 為 TEM 繞射環圖譜可觀察到 Gd₂O₂S 多晶粉末之(113)、(200)、(202)、 (203)、(210)與(211)等繞射晶面,並可看出其為六方晶相之結構,由 於曝光時間過長,導致較內圈之繞射點無法清晰被觀察並加以標示。

圖 36 在 H₂S 氣氛中於不同溫度(700-1000),所合成奈米 Gd₂O₂S 之 SEM 影像。圖中顯示可發現有類似水熱法(第一階段)合成時之情 況,甚至有更明顯的趨勢,當溫度逐漸增加時,粒徑大小差距相當懸 殊,尤其是 900 與 1000,皆可看到直徑 70nm、長度 600nm 至直 徑 600 nm、長度 3μm 左右之棒狀結構。

圖 37 與 38 為以硝酸釓與硫脲在不同 pH 值之溶液中所獲得之前 驅物,在 H₂S 氣氛中於 600 退火4小時,所合成奈米 Gd₂O₂S 之 SEM 影像。其微結構和其前驅物大小非常接近,此時我們已成功證實藉由 pH 值的有效調控可以合成不同晶粒形貌之奈米 Gd₂O₂S。

圖 39(a)為前驅物 C 於 600 H₂S 氣氛中反應所合成奈米 Gd₂O₂S 之 TEM 影像,由圖可證實其為奈米棒而非奈米管,直徑 15-20 nm、 長度約 150nm,由於待測物經過稀釋,故 SEM 所測得知數值較可信。 圖 39(b)為 TEM 繞射環圖譜可觀察到 Gd₂O₂S 多晶粉末之(113)、 (110)、(111)、(102)、(101)、(100)、(211)與(201)等繞射晶面。

5-2-3 奈米與微米級 Gd2O2S X 光繞射圖譜之比較

圖 40 為 H₂S 氣氛中於 1000℃ 退火 4 小時,所合成 Gd₂O₂S 與其 他製程所合成產物之 XRD 圖。由圖中可發現兩階段奈米製程與固態 石墨還原製程所合成 Gd₂O₂S 的結晶性略強於固態硫化氫製程所合成 之產物。兩階段奈米製程、固態硫化氫與固態石墨還原裝置,三製程 條件均具還原性,在固態法中均加入 Na₂CO₃ 為助熔劑,可用以降低 製程溫度,因在高溫時 Na₂CO₃與硫形成多硫化鈉(Na₂S_x),為一強硫 化劑。前者(固態硫化氫製程)燒成時置於硫化氫氣氛中,因硫化氫具 強還原性,故可順利進行硫化反應。後者燒結時,將反應物置於雙坩 堝石墨的環境中,石墨在高溫缺氧時會生成具弱還原力 CO 的氣氛, 協助硫化反應之進行;又石墨在高溫時與硫蒸氣反應所生成 CS₂,也 是一強硫化劑,對Gd₂O₃硫化也有增益作用。圖 40 之圖譜與 JCPDS No. 26-1422 化合物圖譜比較結果一致(即圖中最下方之多條直線)。

固態製程同時藉由助熔劑的添加以降低合成溫度,並輔助在高溫 環境中將氧化物硫化,然而固態法硫化氫與石墨還原氣氛製程最低合 成溫度分別為 800℃與 1000℃,前者是因為其粒徑較大(接近微米 級),反應活性相對降低,故需高於水熱法之合成溫度(600℃);後者 除了上述原因之外,主要是石墨具弱還原性所造成,但為了方便各種 特性之比較,三種製程全固定相同之燒結溫度以及時間。

另一方面,由於摻雜離子 Tb³⁺的來源為 Tb₄O₇,其同時具有三價 與四價的氧化態,但只有三價是會發光的,因此還原氣氛是不可或缺 的合成條件。

5-2-4 微米級 Gd2O2S 表面微結構之分析

圖 41 與 42 為在於 1000 下固態硫化氫與固態石墨還原 4 小時 所合成 Gd₂O₂S SEM 影像之比較。圖 41 顯示產物晶粒尺寸平均約為 200-600 nm 之不規則形態(從兩階段奈米製程與固態硫化氫製程,我 們可發現通硫化氫氣體合成時比較不會造成粒徑的變大);至於圖 42 顯示產物晶粒尺寸平均約為 4-8μm,此亦證實固態合成先天上易造 成產物晶粒表面不平整、粒徑大小不均的缺點。

5-3 奈米(Gd_{2-x}R_x)O₂S(R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺)系列螢光體發

光特性之研究

本實驗除了著重於合成不同微結構之 Gd₂O₂S 奈米螢光體,其發 光特性也是研究的重點之一,尤其因奈米材料尺寸縮小而存在的量子 侷限效應,亦是本論文擬探索重點之一,本研究重要結果詳述如下:

5-3-1 主體之自身活化

由固態(石墨)或固態(H₂S)合成之 Gd₂O₂S 主體,存在自身活化的 現象,即不需掺雜本身就會發光,本研究在許多含釓之化合物中均會 有此現象發生,例如:LiGdF₄,Gd₂O₃,GdOF 等主體。 然而水熱法合 成之 Gd₂O₂S 主體則不具此現象,推測其成因主要由於水熱法合成之 產物結晶性太差,此點可由 XRD 圖譜證實,故發光強度極弱。

圖 43 為固態法 H₂S 退火所合成之 Gd₂O₂S 主體之激發與放射光 譜圖; 左側為激發光譜, 在波長 264 nm 處為主體能隙之吸收; 而波 長為 275nm 、313nm 附近陡峭的吸收峰分別源自於 Gd³⁺ ⁸S_{7/2}→⁶I_J, ⁶P_J的 4f→4f 電子遷移。圖 9 顯示 Gd^{3+ 6}P_J與基態 ⁸S_{7/2}間並沒有標示 出任何能階,但並不表示這段區間內不會有任何能階或放射; 圖 43 中右側為放射光譜,其放射在波長 460-710 nm 間呈線光譜放射,由 於這此範圍放射應是來自於上述 Gd^{3+ 6}P_J與基態 ⁸S_{7/2}間之特定能階 之放射,故本研究無法標示出其來自於何能階間之遷移,之前從未有 文獻有報導過此現象。

5-3-2 濃度效應與機制探討

在稀土價軌域 4f 5d 相關的能階中,常見兩種不同形式的電子能 態出現,其分別為 4fⁿ⁻¹5d¹ 態與電荷遷移態,前者為一個 4f 電子轉移 到 5d 軌域,後者是鄰近的陰離子將電子轉移到 4f 軌域。他們共通的 特性為在波長 300nm 附近有一強且呈寬帶的吸收,f-d 躍遷常見的有 Tb³⁺、Pr³⁺,而電荷遷移常見的有 Eu³⁺。一般而言,容易氧化成4 價 的離子,具有較低 4f-5d 遷移能;容易還原成2 價的離子,具有較低 電荷遷移能,例如:

 $Tb^{3+}(f^{8}) + (e-h) \rightarrow Tb^{4+}(f^{7}) + e \rightarrow {}^{5}D_{n} + hv$ $Eu^{3+}(f^{6}) + (e-h) \rightarrow Eu^{2+}(f^{7}) + h \rightarrow {}^{5}D_{n} + hv$

由上兩式的第一步可看出 Tb³⁺具有較高的電洞親和力,而 Eu³⁺具有較高的電子親和力,均是由於 Tb³⁺與 Eu³⁺趨向較穩定電子組態(4f⁷)所驅動的。由上兩式的第二步可看出電子和電洞在 Tb 或 Eu 格位的再結合而發光。

圖 44 顯示:由 Gd₂O₂S 主體的全反射光譜,可以估計其能隙約為 4.75 eV(261 nm),與文獻^[49]記載的 4.77eV (260 nm)十分接近。然而由 光譜圖 43 中波長為 264 nm 之吸收,應也是主體價帶-導帶間之吸收, 推測應是測量誤差所造成。

Mannun .

5-3-2-1 奈米 Gd₂O₂S:Tb³⁺螢光體 PL 光譜之研究

圖 45 顯示在激發光譜中,主要分為幾部分,首先,可觀察到在 264 nm (4.70 eV)處有一較強且寬廣的吸收峰,此為主體吸收峰(Host Absorption Band);其次;在 275 nm 、313 nm 附近陡峭的吸收峰分別 為 Gd^{3+} ⁸S_{7/2}→⁶I_J, ⁶P_J 的 4f→4f 電子遷移所產生的吸收峰。一般 Gd^{3+} 可激發到相當高的能階,甚至到真空紫外光(VUV:小於 200 nm)範 圍,313 nm(3.96 eV)已是其最低能量之躍遷;最後,在 290 nm(4.27 eV) 處具有寬廣吸收峰,此乃 Tb³⁺ 4f 到 5d 電子遷移所造成的,同時,在 340-380 nm 以及 489 nm 處較弱之吸收峰分別為 Tb³⁺⁷F₆→⁵D₃, ⁵D₄ 的 4f→4f 電子遷移所產生。 圖 45 顯示隨著摻雜濃度的增加, Tb³⁺ 4f→5d 遷移的強度亦迅速 增加,其最佳摻雜濃度為 3 mole%(如圖 59 所示), 但若繼續增加 Tb³⁺ 摻雜濃度時,則其發光強度不再昇高,反而呈現下降,此乃因 Tb³⁺ 離子 間 的 交 錯 弛 豫 (cross-relaxation) 與 淬 滅 點 造 成 濃 度 淬 滅 (concentration quenching)的現象:

 $Tb^{3+}({}^{5}D_{3}) + Tb^{3+}({}^{7}F_{6}) \rightarrow Tb^{3+}({}^{5}D_{4}) + Tb^{3+}({}^{7}F_{0})$

然而 Tb³⁺最佳摻雜濃度相應之吸收強度仍低於主體的吸收,推測 其原因為 Tb³⁺取代 Gd³⁺格位的效果不是很好所造成。最佳激發波長 為 264nm。

 Tb^{3+} 的電子組態 4f⁸,其發光通常呈線光譜,其特性光譜約可分成兩區:一為 ${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{J}$ 躍遷,主要分佈於綠光(強)至橘紅光(微弱)範圍;另一則為 ${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{J}$ 躍遷,主要出現於藍光的範圍。

圖 46 之發射光譜可觀察到放射峰主要出現在 383 nm (${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{6}$)、416 nm (${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{5}$)、439 nm (${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{4}$)、469 nm (${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{3}$)、474 nm (${}^{5}D_{3} \rightarrow {}^{7}F_{2,1}$)、488 nm (${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{6}$)、543 nm (${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{5}$)、586 nm (${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{4}$)與 621 nm (${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{3}$)等波長,隨 Tb³⁺的濃度增加,源自 ${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{J}$ 放射躍遷強度也隨之增加;其中以 ${}^{5}D_{4} \rightarrow {}^{7}F_{5}$ 放射強度最高,其發光 呈現黃綠色。

人的眼睛最敏感的區域在 555 nm 附近(由 Phosphor Handbook p.190 得知),而 $Tb^{3+5}D_4 \rightarrow {}^7F_5$ 最強放射出現於波長 543 nm,因此本實驗的三種摻雜離子中, Tb^{3+} 發光對人肉眼刺激值最大,故為最亮的。

5-3-2-2 奈米 Gd₂O₂S:Pr³⁺螢光體 PL 光譜之研究

Pr³⁺離子的基態是 4f²,激發態為 4f¹5d¹,源自於 4f 軌域中一電子 被激發至能階較高的 5d 軌域; d→f 躍遷,是屬 parity allowed 也是選 擇律所允許的,因此除了呈現強烈吸收帶外,其螢光放射很強。 圖 47 在激發光譜中,仍可看到主體與 Gd³⁺固定位置之吸收峰;同時,在 303 nm(4.09 eV)處有 Pr³⁺ 4f 與 5d 間電子遷移所造成的寬廣吸收峰,其最佳摻雜濃度為 2 mole%(圖 59),最佳激發波長為 303 nm。 濃度淬滅主要歸因於猝滅點以及 Pr³⁺離子間的交錯弛豫:

 $\Pr^{3+}({}^{3}P_{0}) + \Pr^{3+}({}^{3}H_{4}) \rightarrow \Pr^{3+}({}^{1}D_{2}) + \Pr^{3+}({}^{3}H_{6})$

Pr³⁺離子其可能的放射波長分佈可由綠光延伸到紅光。綠光放射 係源自於³P₀激發態,而紅光放射則來自於¹D₂激發態。

圖 48 發射光譜顯示到放射峰主要出現在 512 nm (${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}H_{4}$)、546 nm (${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}H_{5}$)、638 nm (${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}H_{6}$)、667 nm (${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}F_{2}$)與 766 nm (${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}F_{4}$)之處,其中螢光強度以 ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}H_{4}$ 躍遷最強,其發光呈現綠色。 然而在圖 75 (固態石墨合成法)中,可隱約看到 700-730nm 處有微弱 ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}F_{3}$ 的躍遷。

由於此處 Pr³⁺離子的發光是屬於 4f² ³P₀→³H_J,³F_J能階間之遷移, 由於 ³P₀能階不受結晶場的影響而產生能階分裂(因為 J=0),所以圖 46 放射光譜所呈現 Pr³⁺離子的特徵峰,應是 ³H_J與 ⁷F_J能階受結晶場 影響而呈現劈裂所造成的現象。

一般 ${}^{1}D_{2}$ 亦為 Pr^{3+} 之特定發光能階, ${}^{1}D_{2}$ → ${}^{3}H_{4}$ 的放射約在 610-615 nm 附近,然而在本實驗之 $Gd_{2}O_{2}S$ 主體中看不到其放射,主要原因 有二: 第一、一般掺雜稀土 Pr^{3+} 之氧化物, ${}^{3}P_{0}$ 與 ${}^{1}D_{2}$ 間的能隙約 3400 cm⁻¹,而每個聲子(phonon)放射約 500 cm⁻¹,因此最少需要7個以 上之多聲子放射,才能降到 ${}^{1}D_{2}$ 能階,進而產生放射。由於多聲子放 射的效率非常低,所以其放射強度相當弱[50];第二、 $Gd_{2}O_{2}S$ 主體中 由於 S^{2-} 之電負度較小(小於氧離子), Gd-S 的鍵長大於 Gd-O 的鍵長, Gd-S 的共價性小於 Gd-O 的共價性,造成整體 Gd-配位原子間的距離 增加(共價性變弱),電子振動遷移機率變小,電子-聲子偶合變弱,不 易造成多聲子緩解,因此本實驗中看不到 $^{1}D_{2} \rightarrow {}^{3}H_{4}$ 的放射放射 $^{[51]}$ 。

當主體容易發生多聲子緩解時,表示易散失能量,發光效率亦隨 之降低,故一般硫氧化物的發光效率高於氧化物(主體因素)。附帶一 提的是,在某些氟化物晶格中,可發現 Pr³⁺之 4f⁴5d¹能階低於 ¹S₀,導 致在 UV 範圍呈寬帶放光(例如:LiYF₄:Pr 其放光在 210-270nm 之間)。

圖49在激發光譜中,仍可看到主體與 Gd^{3+} 固定波長之吸收峰;同時,在349 nm (3.55 eV)附近出現強且寬廣的吸收峰,此為電荷遷移後,配位基到中心 Eu^{3+} 離子的電子轉移所造成^[52],且在波長 396 nm、418 nm 與469 nm 的吸收峰,分別為 $Eu^{3+7}F_0 \rightarrow {}^5L_6 \cdot {}^7F_0 \rightarrow {}^5D_3 \cdot {}^7F_0 \rightarrow {}^5D_2$ 的4f→4f 電子遷移所產生。雖然電荷躍遷帶(C.T.B)不是最強吸收峰, 但是其吸收峰較寬廣,較有應用價值,故最佳激發波長為349 nm。

圖 50 在發射光譜中,則可觀察到放射峰主要出現在 467 nm (⁵D₃ →⁷F₄)、474 nm (⁵D₂→⁷F₁)、489 nm,495 nm (⁵D₃→⁷F₅)、512 nm (⁵D₂ →⁷F₃)、538 nm,543 nm (⁵D₂→⁷F₄)、555 nm (⁵D₁→⁷F₂)、581 nm (⁵D₀ →⁷F₀)、586 nm,594 nm (⁵D₀→⁷F₁)、616 nm,625 nm (⁵D₀→⁷F₂)與 705 nm (⁵D₀→⁷F₄)的位置;由圖中可發現 ⁵D₀→⁷F₂的發射躍遷強度遠 大於 ⁵D₀→⁷F₁躍遷強度。根據文獻^[7]顯示:本研究所掺入的 Eu³⁺,佔 據主體晶格中不具有反轉對稱中心(non-inversion symmetry)的格 位,使得 5d 能階混成到 4f 能階,造成電偶極(electric-dipole)型的電 子遷移,因此不再被嚴格限制,故不再是弱強度的放射峰,此稱之為 強迫式電偶極(forced electric-dipole)型電子躍遷^[53,54],其發光呈現紅 色。值得一提的是,若 ⁵D₀→⁷F₁躍遷強度較強,此時掺入的 Eu³⁺佔據 主體晶格中具反轉對稱中心的格位,則造成磁偶極(magnetic-dipole) 型的電子遷移,例如 Ba₂GdNbO₅、NaLuO₂與 InBO₃等主體則呈現此現像。

 Eu^{3+} 最佳掺雜濃度為 2 mole%(圖 59),由圖 50 可發現 ${}^{5}D_{2}$ 與 ${}^{5}D_{1}$ 放射的淬滅,是由於淬滅點與 Eu^{3+} 離子間之交錯弛豫所造成:

 $\operatorname{Eu}^{3+}({}^{5}D_{J}) + \operatorname{Eu}^{3+}({}^{7}F_{\theta}) \rightarrow \operatorname{Eu}^{3+}({}^{5}D_{\theta}) + \operatorname{Eu}^{3+}({}^{7}F_{J})$

由於 Eu^{3+} 離子的發光是屬於 $4f^{65}D_0$ 能階至 ${}^7F_J (J = 0,1,2,3,4,5,6)$ 能 階間之遷移,且 5D_0 能階不受結晶場的影響而產生能階分裂(因為 J = 0),所以圖 50 發射光譜所呈現 Eu^{3+} 離子的特性峰,應是 7F_J 能階受結 晶場影響而呈現劈裂所造成的現象。

由 625 nm 強的放射也可證實形成的主體為 Gd₂O₂S, 若為 Gd₂O₃ 主體,則其放射在 611 nm 附近。實驗結果得知: Gd₂O₂S 無法摻雜 Eu²⁺離子而發藍光(在 400-500 nm 之間成寬帶放射),因為反應已在 H₂S 還原氣氛下進行,仍無法將其還原成 Eu²⁺,主要是由於離子半徑 Eu²⁺> Gd³⁺所造成。

人的眼睛最敏感的區域在 555 nm 附近,當波長增加時,則眼睛 的敏感度迅速下降,所以人的眼睛對線光譜呈現的紅光,會比同色度 值與發光強度之帶光譜放射的紅光來的敏感。

5-3-3 温度效應之探討

由於 Tb³⁺、Pr³⁺與 Eu³⁺的最佳摻雜濃度分別為 3 mole%、2 mole%以及 2 mole%,故以其為固定摻雜濃度,作溫度效應之探討,希望能合成粒徑均勻、高發光亮度與高色飽和度之奈米螢光體:

5-3-3-1 水熱法溫度的影響

圖 51 與圖 52 分別為不同之水熱法溫度(第一階段)配合 600℃硫 化氫退火處理所合成奈米(Gd₁₉₇ Tb_{0.03})O₂S 之激發與放射光譜。光譜 分析顯示當溫度越高時,其發光強度則明顯增強,而且隨著溫度的上 升,密閉系統中壓力越大,Tb³⁺吸收強度已高過主體與Gd³⁺的吸收, 其結果顯示高溫退火所進行時之摻雜效果較佳,導致其吸收與放射效 率均提升。由於反應是在密閉系統中進行,一般而言熱溶劑法反應的 溫度均設定於溶劑沸點之上,溫度的提高會造成容器內的壓力增大, 因此能夠控制溫度除外的變因;在高溫高壓下會使離子具有較大之 動能,發生有效碰撞機會增加,使得晶體成長速率增快,造成粒徑有 明顯變大以及尺寸不均之現象,故仍以140℃做為合成條件。然而溫 度增加時,吸收光譜沒有偏移之現象,乃是由於高溫時之平均粒徑大 小和低溫時差距不大,大小不均而已。

5-3-3-2 高温退火温度的影響

圖 53、54 與 60 顯示 900℃為最佳合成(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 退火溫度,同樣的,隨著溫度升高,Tb³⁺吸收強度與主體吸收強度有逐漸接近之趨勢,此即 Tb³⁺吸收強度增加的幅度較大。

曾有文獻指出^[55],當粒徑增加時,Gd₂O₂S:Tb³⁺螢光體的內部轉 換效率(ICE)增加,即發光效率增加,學者指出其歸因於顆粒表面有 非輻射淬滅點的存在;也就是說,粒徑越小,非輻射淬滅點越多,發 光效率越弱。

圖 55、56 與 60 顯示 1000℃為合成($Gd_{1.98}$ $Pr_{0.02}$)O₂S 最佳退火溫度,並發現激發光譜中最高峰在 270 nm 附近,其和 275 nm 之吸收同為 Gd^{3+} $^{8}S_{7/2} \rightarrow ^{6}I_{J}$ 吸收峰;至於主體吸收峰則在 270 nm 左邊之肩狀突出部分。

圖 57、58 與 60 顯示 1000℃為(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 最佳合成之退火 溫度,隨著溫度的增加,發光亮度增加。由於水熱合成之主體結晶性 不佳,由 XRD 圖譜的寬化現象可粗略判斷奈米晶之特性,故不同之 退火溫度可能會對激發光譜造成些微偏移之效果,由圖 57 可發現: 退火製程溫度越高吸收峰波長越趨向藍位移,此處和粒徑大小造成之 位移無關。

將發光光譜與奈米微結構作衡量之後,發現以140℃作為第一階 段水熱合成溫度,600℃作為第二階段退火溫度,以合成 (Gd_{2-x}R_x)O₂S (R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺)系列奈米螢光體; 然而和固態法所合成樣品比 較發光特性時,為了固定合成條件,以 1000℃或發光亮度最強的作 為退火溫度。

由圖 59 與 60 可發現,水熱法合成,相同退火條件時,三種摻雜 離子中以 Tb³⁺發光亮度最強,其餘兩種強度差不多; 然而用固態法 (石墨)合成時,Tb³⁺與 Eu³⁺發光亮度差不多,約為 Pr³⁺之 3-4 倍。

5-3-3-3 色度座標之探討

圖 61 為不同退火溫度所合成奈米(Gd_{2.x}R_x)O₂S (R=Tb³⁺、Pr³⁺、 Eu³⁺)系列螢光體之色度座標。結果顯示(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 之色度座標 值均為(0.33, 0.58),不隨溫度而改變,肉眼觀察為黃綠光;不同溫度 所製備(Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 之色度座標值各為 600°C(0.17, 0.55), 700°C(0.19, 0.56), 800°C(0.17, 0.60), 1000°C(0.16, 0.66),隨溫度升高, 色飽和度增加,肉眼觀察為綠光;而不同溫度所製備(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 之色度座標值各為 600°C(0.32, 0.17), 700°C(0.37, 0.20), 800°C(0.43, 0.24), 1000°C(0.51, 0.30),隨溫度升高而色飽和度增加,肉眼觀察為 紅光。由色度座標的位移,可發現溫度升高時,在黃光到紅光範圍之 放射比例增強,即⁵D₀之放射增強。

由圖 61 可發現 700℃或 800℃時, (Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 與(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 色度座標值的連線經過白光的範圍; 600℃時, (Gd_{1.97}

53

Tb_{0.03})O₂S 和(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 色度座標值的連線也經過白光的範圍, 也許具有合成白光奈米螢光體之潛力。由圖 78-80 可發現這是固態合 成法 Gd₂O₂S:R 無法達到的。

5-3-4 不同釓來源為反應物對發光特性之影響

圖 62 與 63 顯示由氧化釓合成(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 之激發與放射強 度最強,主要是由於其結晶性最佳與粒徑最大,此可由 XRD 圖與微 結構圖得到佐證。因為由硝酸釓合成之(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 外觀呈淡黃 色,而由氯化釓合成之(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 呈咖啡色,顏色越深會使亮 度變弱,所以亮度其次為硝酸釓,最弱的為氯化釓。同時可發現圖 63(b-e)中,弱鹼(塊狀)較強鹼(棒狀)所合成螢光粉體來得亮,主要歸 因於塊狀結晶性與體積略大於棒狀,以及塊狀較接近球狀(發光效率 較佳)所造成。由圖中可發現,不同的釓來源所合成之(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 其激發光譜呈現很大的差異,以硝酸釓或氯化釓所合成之(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S,其Tb³⁺掺雜的效果較佳(Tb³⁺特徵吸收峰較明顯),主體效 應的影響較低。

由氯化釓所合成之(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 發光效率較差,較無應用價值,所以在後續 Pr³⁺與 Eu³⁺之摻雜,只研究氧化釓與硝酸釓之激發與 放光特性。

圖 64 與 65 顯示仍是由氧化釓所合成之(Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 激發與放 射強度最強;且發光亮度與由硝酸釓合成的,一個相差 8 倍(塊狀)、 一個差 15 倍(棒狀)。

圖 66 與 67 顯示仍是由氧化釓所合成之(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 激發與 放射強度最強,原因如上述。已知電荷遷移帶來自 Eu³⁺和配位基之間 的電子轉移,且由水熱合成之主體結晶性較差,所以會造成電荷遷移 带有所偏移。

5-3-5 溶劑填充率

圖 68 與 69 分別探討不同溶劑填充率對奈米(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 螢 光體激發與放射光譜所產生之效應。雖然由圖中發現其強度相差不 大,但仍看得出填充率 60%的,其吸收跟放射強度略高,符合填充 量越多時,其高壓反應器內部壓力則會相對提高,造成此時溶劑中離 子的擴散速率增加使 Tb³⁺較易取代 Gd³⁺的格位,同時奈米螢光體成 核(nucleation)速率亦將加速。

5-3-6 不同鹼液的影響

圖 70 與 71 分別為不同驗液來源所合成(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 之激發 與放射光譜圖。根據所得之棒狀微結構斷定,其形狀應是受 OH 基影 響而造成(兩者合成之粒徑大小形狀差不多),而且 NaOH 與 KOH 均 是 OH 基提供者,故基本上激發與放射光譜圖應不會有太大之差異。

5-4 奈米與微米級(Gd_{2-x}R_x)O₂S(R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺)系列 螢光體發光特性與色度之研究

本實驗之合成方法共分三種:水熱法(前驅物 A:R)加上 H₂S 退火 製程、固態(石墨)法與固態(H₂S)法。由 5-3-2-2 節所述得知水熱法 (Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 之最佳退火合成溫度為 900℃,且(Gd_{1.98} Pr_{0.02})O₂S 與(Gd_{1.98} Eu_{0.02})O₂S 則為 1000℃。然而固態法合成 Gd₂O₂S:R 之最低 溫度為 1000℃,因此在(Gd_{1.97} Tb_{0.03})O₂S 中以水熱法(前驅物 A:R)加上 退火溫度 900℃與固態法 1000℃作發光特性之比較,其餘兩種摻雜均 以 1000℃作發光特性之比較:

5-4-1 奈米與微米級發光特性之比較

圖 72 與 73 分別為不同方法合成之(Gd1 97 Tb0 03)O2S 激發與放射 光譜圖。由於粒子奈米化後,電子軌域已成定域化,能階似分子軌域 之非連續性,而非大尺寸塊材(bulk)之帶狀分佈,且導帶能階與價帶 能階間的能量差(energy gap)有大幅增大的現象,故吸收光譜中 absorption edge 明顯呈現藍位移的現象。由於水熱法合成之粒徑最 小,故可觀測到 Tb³⁺吸收峰有往高能量(短波長)之藍位移(290 nm)的 現象。由圖 72 與 73 中發現水熱法 + 退火所合成的激發與放射強度 均比固態法(H2S)來的高,原因是水熱法 + 退火所合成之粒徑小,表 面活性、反應性高,故相同條件(指通硫化氫)下,摻雜之效果與發光 亮度均較佳;圖中顯示經由固態法(石墨)所得之激發與放射強度最 強,推測其原因可能有兩個:第二,通硫化氫的製程可能提供的硫過 量; 第二, 通硫化氫的製程還原性太強(石墨較弱), 造成主體中氧含 量的缺乏,氧的缺陷變多(用 XRD 圖可能無法判斷),以致於造成亮 度減弱。曾有文獻報導[56],將所得之硫氧化物經過在空氣中得熱處理 後,可減少氧的缺陷,進而增加發光效率。由上述原因可知,固態(石 墨)法摻雜效果最佳,因此主體的吸收較弱(被 Tb³⁺吸收峰範圍所重 疊),較適合合成高亮度 Gd₂O₂S:Tb³⁺螢光粉。圖 73 中固態(石墨)所合 成Gd₂O₂S:Tb³⁺之放光強度約為水熱法所合成產物之2倍。

由於硫離子的游離能較氧離子低,所以在晶格中大部分是形成硫 缺陷而不是氧缺陷^[57],當助熔劑中的 Na⁺取代 Gd³⁺時^[58],會造成硫缺 陷的增加,為了維持電荷的平衡,硫缺陷有時會捕捉一個電子,在 480 nm 附近呈現一典型吸收峰(但在本圖中無法斷定)。

56

圖 74 與 75 分別為不同方法合成之(Gd_{1.98}Pr_{0.02})O₂S 激發與放射光 譜圖之比較。由於水熱法合成之粒徑最小,故同樣可觀測到激發光譜 有藍位移(303 nm)的現象。固態(石墨)製程所合成樣品的發光強度仍 為最強的,約為水熱法之 1.5 倍,固態(H₂S)亮度仍是最弱的。

圖 76 與 77 分別為不同方法所合成之(Gd_{1.98}Eu_{0.02})O₂S 激發與放 射光譜圖。三種方法所合成 Gd₂O₂S:Eu³⁺樣品之相對強弱如上,固態 (石墨) 的發光強度約為水熱法之 5 倍,主要可歸因於其主體結晶性 好、粒徑大,造成 Eu³⁺和 O²⁻之間的電荷躍遷帶吸收強度暴增所致。

5-4-2 奈米與微米級 Gd2O2S:R 螢光體色度之比較

圖 78-80 分別為不同方法所合成之($Gd_{1.97}Tb_{0.03}$)O₂S、 ($Gd_{1.98}Pr_{0.02}$)O₂S與($Gd_{1.98}Eu_{0.02}$)O₂S色度座標之相關位置。分析結果如 下表所示,可知所合成之($Gd_{1.97}Tb_{0.03}$)O₂S螢光體,均位於黃綠光範圍; 所合成之($Gd_{1.98}Pr_{0.02}$)O₂S,由水熱法所得之色飽和度最高,肉眼觀察 為綠光;所合成之($Gd_{1.98}Eu_{0.02}$)O₂S,則由固態(石墨)法所得之色飽和 度最高,肉眼觀察為紅光。由於 1000℃時所合成之($Gd_{1.98}Eu_{0.02}$)O₂S 紅光的色飽和度較高,與Tb³⁺或Pr³⁺之色度座標值連線時不會通過白 光之範圍,故無法如 5-3-2-3節所述般合成白光。

下表為不同製備方法所合成(Gd_{2-x}R_x)O₂S (R = Tb³⁺, Pr³⁺, Eu³⁺)色 度座標之比較:

	水熱+退火	固態法(石墨)	固態法(H ₂ S)
$(Gd_{1.97}Tb_{0.03})O_2S$	(0.33, 0.58)	(0.35, 0.56)	(0.33, 0.51)
$(Gd_{1.98}Pr_{0.02})O_2S$	(0.16, 0.66)	(0.18, 0.64)	(0.20, 0.63)
$(Gd_{1.98}Eu_{0.02})O_2S$	(0.51, 0.30)	(0.60, 0.37)	(0.57, 0.34)

第六章 結論

本研究主要利用水熱法並配合 pH 調控以合成奈米級 Gd₂O₂S 以 及三系列 Gd₂O₂S:R(R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺)奈米螢光體,並將其與傳統 固態法所合成者作微結構、發光特性與色度之比較。

本論文採兩階段奈米 Gd₂O₂S:R 製程:第一階段為利用水熱法於 140℃製備前驅物(如:Gd(OH)₃),第二階段則將此前驅物於 600℃ H₂S 氟氛下退火4小時,則可成功地合成出奈米級 Gd₂O₂S 螢光體。由 TEM 與 SEM 證實:pH 值與釓來源為影響其微結構之主要因素。當氧化釓/ 硫脲/pH=6 為反應條件時,可獲得直徑約 100-200 nm,而長度為 1-2µm 之 Gd₂O₂S:R 奈米棒;而以硝酸釓或氯化釓/硫脲/pH < 9 時,可獲得粒 徑約 80nm 之塊狀 Gd₂O₂S:R, pH > 10 時,可獲得長度、直徑分別為 200nm 與 20nm 之奈米棒。

本論文發現, 奈米 Gd2O2S:R 螢光體發光亮度與粒徑大小成正 比,與合成時 pH 值成反比; 除此之外,發光亮度與水熱合成溫度、 退火溫度均成正比,但是提高反應容器填充率對奈米螢光體發光強度 增強效果並不明顯,同時不同鹼液來源影響亦不大。在相同溫度合成 之奈米與塊材 Gd2O2S:R 發光特性,受結晶性、粒徑與還原強度之影 響,發光強度遠低於塊材樣品。激發光譜研究顯示: 奈米螢光體相對 於塊材其吸收峯波長呈藍位移。奈米 Gd2O2S:R(R=Tb³⁺、Pr³⁺、Eu³⁺) 螢光體光致發光之探討,顯示其發光色度與最佳摻雜濃度分別為黃綠 (3 mole%)、綠(2 mole%)與紅(2 mole%)色。

以固態法配合還原氣氛可製備微米與次微米級 Gd₂O₂S:R 螢光體 的研究顯示:以硫化氫氣體進行熱處理時不會造成粒徑的變大,然而 殘留過量硫與還原性氣氛太強會造成發光亮度降低。固態法(石墨)所

58

合成之 Gd₂O₂S:R 粒徑約 4-8 µm,而固態法(H₂S) 所合成之 Gd₂O₂S:R 粒徑約 200-600nm。固態合成具有晶粒形貌不規則、表面不平整、粒 徑大小不均等缺點。本研究亦發現固態法合成樣品,由於結晶性較 好,無摻雜的 Gd₂O₂S 就具有自身活化的現象,推測為 Gd³⁺ ⁶P_J 與基 態 ⁸S_{7/2} 間之特定能階之放射,色光呈橘黃色。



參考文獻

- J. M. P. J. Verstegen, D. Radielovic and L. E. Vrenken, J. Electrochem. Soc., 121, 1627 (1974).
- [2] G. Boulon, *Mater. Chem. Phys.*, **16**, 301 (1987).
- [3] L. J. Andrews, G. H. Beall and A. Lempicki, *J. Lumin*, 36, 65 (1986).
- [4] R.T. Wegh, H. Donker, K.D. Oskam, A. Meijerink, *Science*, 283, 663 (1999).
- [5] R.T. Wegh, E.V.D. van Loef, A. Meijerink, *J. Lumin.*, 90, 111-122 (2000).
- [6] 蘇勉曾、吳世康, "發光材料", Vol.4, p.2.
- [7] G. Blasse and B. C. Grabmaier, *"Luminescence Materials"*, Springer, Berlin (1994).
- [8] D. A. Skoog, D. M. West, "Principles of Instrumental Analysis", New York, Holt, Reinhart & Winstin, (1971).
- [9] R. B king, "Encyclopedia of Inorganic Chemistry", 4, John Wiley & Sons (1994).
- [10] R. C. Ropp, "Luminescence and the solid state", Amsterdam Elsevier (1991).
- [11] W. R. Blumenthal and D. S. Philips, J. Am. Ceram. Soc., 79, 1047 (1996).
- [12] A. Ikesue and I. Furusato, J. Am. Ceram. Soc., 78, 225 (1995).
- [13] R. P. Rao, J. Electrochem. Soc., 143, 189 (1996).
- [14] M. Gomi and Kanie, Jpn. J. Appl. Phys., 35, 1798 (1996).
- [15] 張有義、郭蘭生編著, "膠體與界面化學入門",高立圖書公司,台北市,民國86年。
- [16] D. Myers, "Surfactant Science and Tecnology", VCH, New York

(1998) •

- [17] 林麗玉,國立交通大學應用化學所,碩士論文,民國 89 年 6 月。
- [18] 蔡文娟,國立清華大學化學所,博士論文,民國 87 年 3 月。
- [19] 陳育山,國立交通大學應用化學所,碩士論文,民國 91 年 6 月。
- [20] Y. D. Li, H. W. Liao, Y. Ding, Y. T. Qian, et al , *Chem. Mater.*, 10, 2301. (1998).
- [21] Y. D. Li, H. W. Liao, Y. Ding, Y. Fan, Y. Zhang, Y. T. Qian, *Inorg. Chem*, 38, 1382. (1998) °
- [22] 劉如熹、王健源, "白光二極體製作技術 21 世紀人類新矚 光", Ch.1-20.
- [23] 水野博之著, "光電工學的基礎", 第五章, 復漢出版社, 民國 82 年。
- [24] 余松熠、周源華著, "數位影像處理",第二章,格致圖書公司,
 民國 82 年。
- [25] G. Blasse, *Structure and Bonding*, vol.76, Springer Verlag, Heidelberg (1991).
- [26] C. S. Shi and Q. Su, The Chemistry and Physics of Abnormal Valency Rare Elements, Science Press, Beijing (1994).
- [27] 紀乃瑋,國立交通大學應用化學所,碩士論文,民國 91 年 6 月。
- [28] http://elearning.stut.edu.tw/m_facture/Nanotech/Web/ch7.htm, 南台科技大學機械工程系
- [29] 吴明立,博士論文,成功大學化學工程研究所,2001年。
- [30] Z. L. Wang, T. S. Ahmad, M. A. El-Sayed, Surf. Sci., 380, 302, (1997).
- [31] A. P. Alivisatos, *Science*, **271**, 933, (1996).
- [32] T. Yoshioka, O. J. Sovers, *Proc. Rare Earth Res. Conf.*, 7(2), 575 (1969).

- [33] H. Forest, U.S. Patent 3,793,527 (1974).
- [34] J. Hoelsae, M. Leskelae, L. Niinistoe, *Materials Research Bulletin*, 14(11), 1403 (1979).
- [35] S. Yokono, T. Abe, T. Hoshina, J. Lumin., 24/25, 309 (1981).
- [36] T. Kano, J. Lumin., **29**, 177 (1984).
- [37] 山田和弘、吉田紀史,日本國特許廳公開特許公報,平4-149020(1992).
- [38] Z. Wu, S. Zhang, *Huaxue Wuli Xuebao*, 5(1), 29-35(1992)
- [39] K. R. Reddy, K. Annapurna, S. Buddhudu, *Mater. Res. Bull.*, 31, 1355 (1996).
- [40] M. Tamatani, N. Matsuda, M. Okumura, A. K. Albessard, Y. Inoue,
 S. Yokota, K. Kawasaki, *Proceedings Electrochemical Society* (1998), 97-29(*Luminescent Materials*), 10-21.
- [41] M. Okumura, M. Tamatani, K. Alvesarl, N. Matsuda, Jpn. Kokai Tokkyo Koho (Toshiba Patent, JP 10102053 A2 19980421) (1998).
- [42] R. Nakamura, N. Yamada, M. Ishii, Japanese Journal of Applied Physics, Part 1, 38(12A), 6923-6925 (1999).
- [43] S. H. Yu, Y. T. Qian, et al, *Chem. Mater.*, **11**, 192 (1999).
- [44] J. A. Yang, Y. Wu, Y. Xie and Y. H. Qian, J. Am. Ceram. Soc., 83, 2628 (2000).
- [45] X. Wang, X. Sun, D. Yu, B. Zou, Y. Li, *Advanced Materials*, 15, 1442 (2003).
- [46] R. Morlotti, C. Magro, A. Vedda, M. Martini, S. Croci, M. Nikl, Journal of the Electrochemical Society, 150(4), H81-H84 (2003).
- [47] T. Hirai, T. Orikoshi, *Journal of Colloid and Interface Science*, 269(1), 103-108 (2004).
- [48] 徐敬添、張義和著, "*顏料奈米化、分散與應用*", 化工資訊,
 2, 16 (2002).

- [49] S. Chatterjee, V. Shanker, P.K. Ghosh, *Solid State Commun.*, 80(10), 877 (1991).
- [50] C. De Mello Donega, G.J. Dirksen, H.F. Folkerts, A. Meijerink, G. Blasse, J. Phys. Chem. Solids, 56(2), 267-276 (1995).
- [51] C. De Mello Donega, A. Meijerink, G. Blasse, J. Phys. Chem. Solids, 56(5), 673-685(1995).
- [52] S. Imanaga, S. Yokono and T. Hoshina, *Jpn. J. Appl. Phys.*, **19**, 41 (1980).
- [53] M. Mikami, A. Oshiyama, *Phys. Rev. B*, **60**, 1707 (1999).
- [54] M. Mikami, A. Oshiyama, J. Lumin., 87-89, 1206 (2000).
- [55] R. Morlotti, M. Nikl, M. Piazza, C. Boragno, J. Lumin., 72-74, 772-774 (1997).
- [56] R. Nakamura, N. Yamada, H. Yamada, *Hitachi Kinzoku Giho*, 14, 33-38 (1998).
- [57] T. Kano, J. Lumin., **29**, 177(1984).
- [58] M. Koskenlinna, M. Leskela, L. Niinisto, J. Electrochem. Soc., 123, 75 (1976).
- [59] Y. Ding, G. Zhang, Y. T. Qian, et al, *Chem. Mater.*, 13, 435 (2001).
- [60] S. J. Chen, J. H. Zhou, X. T. Chen, et al, *chemical Physics Letters*, 375, 185 (2003)
- [61] C. H. Lu, C. H. Yeh, *Ceramics International*, **26**, 351 (2000)

Anions that Can be Used to Form Phosphors



(La)	Ce							
(Ac)	Th							



Anions that Are Optically Active-"Self-Activation"



表1週期表中可作為螢光體主體之陰離子團[10]

Cations That Can be Used to Form Phosphors



表 2 週期表中可作為螢光體主體之陽離子[10]



Cations That Can be Used as Activator Center

Н						(+1)	(+2)	(+3)	 He
									Ne
	(+3)	(+1) (+2)	(+3)	(-1)	(0)				Ar
		Cr Mn	Fe	Cu	Z∎	Ga	Ge	As	Kr
		Tc		Ag	Cd	Ĭn	Sn	Sb	Xe
	La	Re		Au	Hg	TI	Pb	Bi	Rn
	Ac								

(La)	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Hø	Er	Tm	Yb	
(Ac)	Th		U										

表3週期表中可作為螢光體活化劑之陽離子[10]

Cations with Unpaired Spins Which Function as Quenchers of Luminescence

H												He
												Ne
		(+3)	(+3)	(+3)				(+2)	(+2)			Ar
		Ti	V	Cr		Fe ²⁺	Co ²⁺	Ni	Cu			Kr
		Zr	Nb	Mo		Rr ⁺	RI ⁺	24				Xe
	La	Hf	Ta	W	Re	0s#	Ir ⁴⁺	Pt				Rn
	Ac										·····	A

(La)							
(Ac)							

表 4 週期表中可作為螢光體發光抑制劑之陽離子[10]

		1111.	
A_2B^{*}	WO ₆	T _q (K)	R (a. u.)
A = Ba	B = Ba	180	10.9
Ba	Sr	240	10.6
Ba	Ca	310	10.2
Ba	Mg	350	10.0
Sr	Mg	350	10.0
Ca	Mg	350	10.0

R 為金屬離子與配為基於基態與激發態之距離差

表 5 化合物 A_2BWO_6 -U 與螢光淬滅溫度(T_q)、 R的關係 (U表 Uranate)^[7]

Phosphor	T _a (K)
CaWO ₄	410
SrWO₄	280
BaWO ₄	<100
YBO ₃ -Eu ³⁺	≅ 950
LaBO ₃ -Eu ³⁺	≅800
LaAlO ₃ -Eu ³⁺	560
BaBPO ₅ -Eu ²⁺	690
SrBPO ₅ -Eu ²⁺	555
CaBPO ₅ -Eu ²⁺	320
LiLuSiO ₄ -Tb ³⁺	≅8 50
LiYSiO ₄ -Tb ³⁺	≅800
LiYGeO ₄ -Tb ³⁺	400

(於短波長紫外線激發下測得)

表6一些螢光體的螢光淬滅溫度(T_q)



	$\Delta R < 0$	$\Delta R > 0$
ΔR	$(e.g.Tl^+, Bi^{3+}, Tb^{3+},$	$(e.g.Eu^{3+},WO^{2-},$
	Ce^{3+} , Eu^{2+})	VO ³⁻)
Activator > host lattice ion	low T _q	high T _q
Activator < host lattice ion	high T _q	low T _q
Lattice with small ions with High charge	high T _q	high T _q

△ R 為金屬離子與配位基之基態與激發態之距離差

表7 △R 與活化劑、被取代之主體晶格陽離子和螢光淬滅溫度(T_q) 的關係



(激发) →→ (吸收)→→(转换)

圖 1 激發能量在固體中的吸收和轉換^[6]







S:敏化劑基態,S敏化劑激發態,ET:電荷轉移, A_1 *:活化劑激發

態,A2*活化劑激發態的基態,A:活化劑基態

圖 2 螢光體發光過程中能量傳遞示意圖^[7]





圖 6 Stokes Shift 示意圖^[7]



(a)弱耦合作用(b)中度耦合作用(c)強耦合作用



圖 8 電子組態為 d^3 與 d^5 之過渡金屬離子之 Tanabe-Sugano diagram R. B. King *Encyclopedia of Inorganic Chemistry*, 4, John Wiley&Sons (1994)


圖 9 自由態三價稀土離子能量分佈圖 G. Blasse and B. C. Grabmaier, *Luminescence Materials*, Springer, Berlin (1994)



ANNULLER.



圖 10 螢光體中主體、活化劑與增感劑三者交互作用示意圖^[6]



圖 11 氣溶膠熱解儀器構造圖



圖 12 微乳液法奈米反應器示意圖

[Dinesh O. Shan., "Micelles, Microemulsions, and Monolayers: Science and Technology", M. Dekker, New York (1998) p24]



圖 13(a) 高壓反應容器(Parr Acid Digestion Bomb)^[19]





圖 13(b) 高壓反應容器側面透視圖^[19]



圖 15 CIE 三刺激曲線函數圖





G. Blasse and B. C. Crabmaier, Luminescence Materials, p. 73



圖 18 高活化劑濃度造成之濃度淬滅(concentration quenching)成因示



圖 19 理想中(a)巨相(b)量子井(c)量子線(d)量子點之能量與量子狀 態密度之關係^[29]



圖 20(b) Gd₂O₂S 主體之 3D 晶體結構示意圖^[29,30]



圖 21 美國 Lindberg 公司製造之程式控溫箱型爐



圖 22 美國 Lindberg 公司製造之 51442 型程式控温管狀爐



- Goniometer Tube stand f
- 23 Aperture silt system
- Sample carrier
- 456
- Detector slit system Detector (scintillation counter)

Bruker AXS D8 advance 機型 X 光繞射儀 圖 23



圖 24 美國 Jobin Yvon-Spex Instruments S. A. Inc.公司所製 Spex



圖 25 日本 LAIKO 所製 DT-100 Color Analyzer



圖 26 Hitachi S-4000 型場發射掃瞄式電子顯微鏡



圖 27 日本 Hitachi 公司所製型號 U-3010 紫外--可見光譜儀配備

積分球(Integral Sphere)